DTÁLOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

012902685 **Image available**
WPI Acc No: 2000-074521/200007

XRPX Acc No: N00-058447

Gray level reproducing method for representing density of each pixel of output image by binary or multivalue data

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: OKINAKA K; SUZUKI T

Number of Countries: 026 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date EP 963105 19991208 19990602 200007 B A2 EP 99304306 Α 20000225 JP 99155106 19990602 JP 2000059626 A Α

Priority Applications (No Type Date): JP 98154459 A 19980603

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 963105 A2 E 122 H04N-001/405

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY'DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

JP 2000059626 A 48 H04N-001/405

Abstract (Basic): EP 963105 A2

NOVELTY - The method involves having non-blue noise properties at every gray level of dot patterns generated in a pixel block of a reference size using a mask of a size smaller than the reference size of the pixel block. In an output image, no moire is generated having visually undesired contrast and an artifact such as a constant repetitive pattern, etc. caused by the mask itself when an input image receives a gray level process and the image is output through an output device having a resolution of over 600 dpi.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are included for a gray level reproducing apparatus, a threshold matrix for use in converting density of each pixel of image, and a computer-readable storage medium.

USE - For representing density of each pixel of output image by binary or multivalue data.

ADVANTAGE - Obtains high quality image with good uniformity of dot distribution using a small mask, and therefore requires reduced memory capacity for storing a large mask because no large mask is required with higher printer resolution.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a flowchart showing the steps for obtaining a dither matrix.

pp; 122 DwgNo 5/84

Title Terms: GRAY; LEVEL; REPRODUCE; METHOD; REPRESENT; DENSITY; PIXEL; OUTPUT; IMAGE; BINARY; DATA

Derwent Class: P75; T01; W02

International Patent Class (Main): H04N-001/405

International Patent Class (Additional): B41J-002/52; B41J-005/30;

G06T-005/00

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): T01-J10B2; T01-J10D; W02-J03A2; W02-J03B

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(18)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2000-59626

(P2000-59626A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

			_			
(51) Int.Cl. ⁷	鑚	例記号	FΙ			テーマコード(参考)
H 0 4 N	1/405		H04N	1/40	С	, (()
B41J	2/52		B41J	5/30	z	
	5/30			3/00	Ā	
G06T	5/00		G06F	15/68	3 2 0 A	

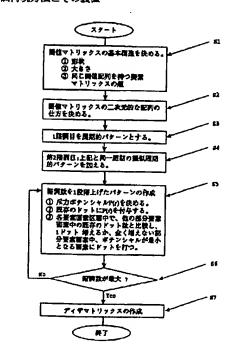
	客查請求	未請求 請求項の数23 OL (全 48 頁)		
特額平 11-155106	(71)出題人	000001007		
平成11年6月2日(1999.6.2)	(-)	キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号		
	東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノ			
日本 (JP)	(72)発明者	•••		
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内		
	(74)代理人	100069877 弁理士 丸島 修 一		
	平成11年6月2日(1999.6.2) 特額平10-154459 平成10年6月3日(1998.6.3)	特額平11-155106 (71)出額人 平成11年6月2日(1999.6.2) (72)発明者 特額平10-154459 平成10年6月3日(1998.6.3) 日本(JP) (72)発明者		

(54) 【発明の名称】 関値マトリックス、及びそれを使用した階調再現方法とその装置

(57)【要約】

【課題】 小型のマスクでドット分布の一様性に優れた 高画質な画像を得ることができるとともに、高精細プリンタにおいてもマスクサイズを大きくする必要が無く、 マスクを記憶しておくためのメモリ容量を小さくすることができる関値マトリックス、及びそれを使用した階調 再現方法とその装置を提供する。

【解決手段】 関値マトリックスにより階調処理され生成されるドットパターンが、(1)各要素マスクに対応する各要素画素区画内のドットの分布が全階調で全く同じとなる要素画素区画の組を持ち、(2)1階調目以降の低階調のうちのいずれかの階調において弱い不規則性、または、擬似周期性が導入され、(3)すべての階調で、すべての要案画素区画内のドットの数が等しく、(4)4n(nは整数) 階調毎に、各要素画素区画を四等分した大きさを持つ四つの部分要素画素区画内のドットの数がすべて等しくなるように、関値マトリックスを形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現方法において、

基準となる大きさの画案区画より小さいサイズのマスクを用いて前記基準となる大きさの画素区画内に生成するドットパターンがすべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、入力画像を階調処理し、およそ600ゆi以上の精細度を持つ出力装置により出力した場合に、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする階調再現方法。

【請求項2】 前記マスク単独により生成されるドットパターンが、すべての階調で非等方性の平均値として1d B程度以上の値を有することを特徴とする請求項1に記載の階調再現方法。

【請求項3】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現方法において、

前記マスク単独により生成されるドットパターンが、すべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自休に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする階調再現方法。

【請求項4】 原画の各画素と閾値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現方法において

前記マスク単独により生成されるドットパターンの二次 元空間周波数スペクトルが、すべての階調でマスクの持つ周期性に起因する複数の孤立スペクトルを持つと共に、複数の階調で、該階調のドットの分布に弱い不規則性(摂動)を導入し、一次元半径方向のスペクトルに低周波数成分の少ないノイズ成分を持たせることにより、階調処理をした出力画像に、視覚的に好ましくない虚像が発生しないことを特徴とする階調再現方法。

【請求項5】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現するために、同一の関値配列を持った比較的小規模の関値マトリックスを原画全体に対応して二次元的かつ規則的に配列して用いる階調再現方法において、

該マスクが、分散ドットディザ法のマスクと同じ大きさのマスク(要素マスク)を複数並べた大きさを持ち、かつ、該マスクにより生成されるドットバターンが、(1)各要素マスクに対応する各要素画素区画内のドットの分布が全階調で全く同じとなる要素画素区画の組を持ち、

(2)1階調目以降の低階調のうちのいずれかの階調において弱い不規則性、または、擬似周期性が導入され、

(3)すべての階調で、すべての要素画素区画内のドットの数が等しく、

(4)4n(nは整数) 階調毎に、各要素画素区画を四等分した 大きさを持つ四つの部分要素画素区画内のドットの数が すべて等しくなる。

ことを特徴とする階調再現方法。

【請求項6】 前記マスクを二次元的かつ規則的に繰り 返し用いる際に、隣り合ったマスクをそれらの境界に沿ってずらすことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1 つに記載の階調再現方法。

【請求項7】 前記マスクの形状が4辺形と異なることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1つに記載の階調再現方法。

【請求項8】 前記弱い不規則性、または、擬似周期性が、前記各要素マスクに対応する各要素画素区画内のすべてかまたは一部の所定の位置に、該区画内の全画素数の1/4以下の画素数を持つ小画素区画を設け、それぞれの小画素区画の中でドットを打つべき一つの画素を選択することにより導入されることを特徴とする請求項5乃至7のいずれか1つに記載の階調再現方法。

【請求項9】 前記マスクを作成するために各階調におけるドットパターンを定める方法として、ある階調におけるドットパターンが定まった場合、すべてのドットに斥力ボテンシャルを付与し、それらボテンシャルの和として定まるボテンシャルが最低となる画素に次ぎの階調におけるドットパターンを定めるためのドットを打つという過程を用いることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1つに記載の階調再現方法。

【請求項10】 カラー画像を複数の色成分に分解し、 少なくとも一つの色成分の原画を入力画像とし、請求項 1乃至9のいずれか1つに記載の階調再現方法を適用した カラー画像の階調再現方法。

【請求項11】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現装置において、

関値マトリックスを記憶する記憶手段と、

前記聞値マトリックスの値を閾値として、原画の各画素 の濃度と画素毎に比較する比較手段と、

前記比較手段の比較結果に応じて、二値あるいは多値化 されたドットパターンを出力する出力手段とを有し、

前記園値マトリックスは、そのサイズは基準となる大きさの画案区画より小さいサイズであり、前記基準となる大きさの画案区画内に生成されるドットパターンがすべての階調で非宵色ノイズ特性を持ち、かつ、入力画像を階調処理し、およそ600dpi以上の精細度を持つ出力装置により出力した場合に、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起

因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする階調再現装置。

【請求項12】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画 素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現 装置において、

閾値マトリックスを記憶する記憶手段と、

前記問値マトリックスの値を関値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較する比較手段と、

前記比較手段の比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットパターンを出力する出力手段とを有し、

前記園館マトリックスは、前記園館マトリックス単独により生成されるドットパターンが、すべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする階調再現装置。

【請求項13】 原画の各画素と閾値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を三値あるいは多値で表現する階調再現装置において、

関値マトリックスを記憶する記憶手段と、

前記園値マトリックスの値を閾値として、原画の各画素の濃度と画素布に比較する比較手段と、

前記比較手段の比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットパターンを出力する出力手段とを有し、

前記関値マトリックスは、単独の関値マトリックスにより生成されるドットパターンの二次元空間周波数スペクトルが、すべての階調で関値マトリックスの持つ周期性に起因する複数の孤立スペクトルを持つと共に、複数の階調で、該階調のドットの分布に弱い不規則性(摂動)を導入し、一次元半径方向のスペクトルに低周波数成分の少ないノイズ成分を持たせることにより、階調処理をした出力画像に、視覚的に好ましくない虚像が発生しないことを特徴とする階調再現装置。

【請求項14】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画 素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現 装置において、

関値マトリックスを記憶する記憶手段と、

前記閾値マトリックスの値を関値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較する比較手段と、

前記比較手段の比較結果に応じて、二値あるいは多値化 されたドットパターンを出力する出力手段とを有し、

前記閾値マトリックスは、分散ドットディザ法のマスク と同じ大きさのマスク(要素マスク)を複数並べた大きさ を持ち、かつ、生成されるドットパターンが、

(1)各要素マスクに対応する各要素画素区画内のドットの分布が全階割で全く同じとなる要素画素区画の組を持ち、

- (2)1階調目以降の低階調のうちのいずれかの階調において弱い不規則性、または、擬似周期性が導入され、
- (3)すべての階調で、すべての要素画素区画内のドットの数が等しく、
- (4)4n(nは整数) 階調毎に、各要素画素区画を四等分した 大きさを持つ四つの部分要素画素区画内のドットの数が すべて等しくなる、

ことを特徴とする階調再現装置。

【請求項15】 原画の各画素における濃度を二値ある いは多値のデータに変換する際に用いられる関値マトリ ックスにおいて、

そのサイズは基準となる大きさの画素区画より小さいサイズであり、前記基準となる大きさの画案区画内に生成されるドットパターンがすべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、入力画像を階調処理し、およそ600dpi以上の精細度を持つ出力装置により出力した場合に、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自休に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする閾値マトリックス。

【請求項16】 原画の各画素における濃度を二値あるいは多値のデータに変換する際に用いられる関値マトリックスにおいて、

前記関値マトリックス単独により生成されるドットバターンが、すべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする関値マトリックス。

【請求項17】 原画の各画素における濃度を二値あるいは多値のデータに変換する際に用いられる関値マトリックスにおいて、

単独の関値マトリックスにより生成されるドットパターンの二次元空間周波数スペクトルが、すべての階調で関値マトリックスの持つ周期性に起因する複数の孤立スペクトルを持つと共に、複数の階調で、該階調のドットの分布に弱い不規則性(摂動)を導入し、一次元半径方向のスペクトルに低周波数成分の少ないノイズ成分を持たせることにより、階調処理をした出力画像に、視覚的に好ましくない虚像が発生しないことを特徴とする関値マトリックス。

【請求項18】 原画の各画素における濃度を二値あるいは多値のデータに変換する際に用いられる関値マトリックスにおいて、

分散ドットディザ法のマスクと同じ大きさのマスク(要素マスク)を複数並べた大きさを持ち、かつ、生成されるドットパターンが、

(1)各要素マスクに対応する各要素画素区画内のドットの分布が全階調で全く同じとなる要素画素区画の組を持ち、

- (2)1階調目以降の低階調のうちのいずれかの階調において弱い不規則性、または、擬似周期性が導入され、
- (3)すべての階調で、すべての要素画素区画内のドットの数が等しく、
- (4)4n(nは整数) 階調毎に、各要素画素区画を四等分した 大きさを持つ凹つの部分要素画素区画内のドットの数が すべて等しくなる、

ことを特徴とする閾値マトリックス。

【請求項19】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現処理を制御する制御プログラムをコンピュータ読み出し可能に記憶する記憶媒体であって、

基準となる大きさの画素区画より小さいサイズであり、前記基準となる大きさの画素区画内に生成されるドットパターンがすべての階調で非肯色ノイズ特性を持ち、かつ、入力画像を階調処理し、およそ600dpi以上の精細度を持つ出力装置により出力した場合に、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しない関値マトリックスと、

前記関値マトリックスの値を関値として、原画の各画条の濃度と画素毎に比較して、前記比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットパターンを出力するよう制御するモジュールを含むことを特徴とする記憶媒体。【請求項20】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現処理を制御する制御プログラムをコンピュータ読み出し可能に記憶する記憶媒体であって、

前記閾値マトリックス単独により生成されるドットパターンが、すべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しバターン等の虚像が発生しないことを特徴とする閾値マトリックスと、

前記閾値マトリックスの値を閾値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較して、前記比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットパターンを出力するよう制御するモジュールを含むことを特徴とする記憶媒体。【請求項21】 原画の各画素と閾値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現処理を制御する制御プログラムをコンピュータ読み出し可能に記憶する記憶媒体であって、

単独の閾値マトリックスにより生成されるドットパターンの二次元空間周波数スペクトルが、すべての階調で関値マトリックスの持つ周期性に起因する複数の孤立スペクトルを持つと共に、複数の階調で、該階調のドットの分布に弱い不規則性(摂動)を導入し、一次元半径方向の

スペクトルに低周波数成分の少ないノイズ成分を持たせることにより、階調処理をした出力画像に、視覚的に好ましくない虚像が発生しない関値マトリックスと、前記関値マトリックスの値を関値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較して、前記比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットバターンを出力するよう制御するモジュールを含むことを特徴とする記憶媒体・【請求項22】 原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現

分散ドットディザ法のマスクと同じ大きさのマスク(要素マスク)を複数並べた大きさを持ち、かつ、生成されるドットパターンが、

処理を制御する制御プログラムをコンピュータ読み出し

可能に記憶する記憶媒体であって、

- (1)各要素マスクに対応する各要素画素区画内のドットの分布が全階調で全く同じとなる要素画素区画の組を持ち、
- (2)1階調目以降の低階調のうちのいずれかの階調において弱い不規則性、または、擬似周期性が導入され、
- (3)すべての階調で、すべての要素画素区画内のドットの数が等しく、
- (4) In (nは整数) 階調毎に、各要素画素区画を四等分した 大きさを持つ四つの部分要素画素区画内のドットの数が すべて等しくなる、

鬩値マトリックスと、

前記閾値マトリックスの値を閾値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較して、前記比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットパターンを出力するよう制御するモジュールを含むことを特徴とする記憶媒体。【請求項23】 原画の各画素と閾値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現装置において、関値マトリックス単独により生成されるドットパターンの非等方性において、すべての階調で該非等方性の平均値が3dB以上を示し、極大値が1 OdB以上を示すスペクトルを持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする階調再現装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は関値マトリックス、 及びそれを使用した階調再現方法とその装置に関し、特 に入力画像データを二値または多値のデータに降調処理 するための関値マトリックス、及びそれを使用した階調 再現方法とその装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、実用的な階調再現方法には、大別 して、誤差拡散法とマスク法とがあった。マスク法と は、基本的には、二値化の際に原画の画素と関値マトリックスの要素とを 1対1 に対応させて出力画の画案の出力値を決める方法である。

【0003】これに対し、誤差拡散法は、個々の画案の出力値を、既に決められた出力値が持つ原画との間に生じた誤差を取り戻すよう計算しながら決めてゆくので、マスク法に比べ、画質は良いが処理速度が遅くなり、高速のプロセッサーを用いても、現状でマスク法の3ないし5倍程度の時間を必要とする。

【0004】以前から知られたマスク法としての組織的ディザ法には、大別して集団ドット(clustered-dot)ディザ法と分散ドット(dispersed-dot)ディザ法とがある(R.Ulichney, Digital Halftoning (MIT Press, Cambridge, Massachusetts) 1987))。

【0005】今から10年程前、プリンタの精細度がまだ低く、平均的には 300~500dpi程であった頃は、画質への要求度が低い場合は分散ドットディザ法、高い場合は誤差拡散法が用いられていた。その理由は、分散ドットディザ法では、出力画像の低階調部分などでマスクサイズを周期とする周期的パターンが含まれている場合、モアレが発生することがあるなど、画質は必ずしも良好ではなかったからである。集団ドットディザ法は階調によらずマスクサイズを周期とする周期的パターンとなり、階調数が上がるに連れ、集団としてのドットの大きさが大きくなる。従って、もともと精細度の高い印刷分野で用いられて来ており、精細度が低い場合には適さない。

【0006】実際に、出力画像が肉眼で観測される場合、人間の眼の明視の距離における周波数応答特性には、1 lp(line pairs)/mあたりにピークがあり、分解限界は、7lp/m程度と言われているので、ドットとドットの間隔のみに関して言えば 0.14m程度が分解出来る限界になる。分散ドットディザ法では、再現すべき階調数を256階調とすると、マスクサイズは 16×16であるから、画像空間に直すと、300dpiでは1.4mm角、500dpiでは 0.8mm角となり、入力画像に一様低階調の部分があると、出力画像には、一つのマスクが作る低階調での特徴あるドット分布が繰り返し現れるので、眼の必度が高い1mm前後の周期を持つその周期性パターンは虚像として十分観測されることになる。

【0007】また、分散ドットディザ法では、128 階調目でのドットパターンを最も高い周波数として、各階調のドットパターンの周期性が高いので入力画像にそれらと同程度の周期を持つ周期性パターンがあると、それらの差の周波数を持つ周期性パターンとしてのモアレが、内眼で感知しやすい1mm前後から数mm程度の周期構造を持つ虚像として観測される。このようなモアレを別にすれば、組織的ディザ法のマスク一枚のみにより生成されるパターンが繰り返されることによる周期性パターンの周期を目の分解能と同程度にするには、2860dpiのアリ

ンタが必要となる。

【0008】誤差拡散法では、誤差の拡散のさせかたにいろいろな方式があったが、Ulichney(前掲書、88.3.1、p.268、及び Dithering with Blue Noise, Proc. IE EE, vol. 76, No. 1, 1988, p. 56)により、摂動誤差拡散法が、各階調で生成された二値化パターン(ドットパターン)の空間周波数スペクトルが背色ノイズ特性を持つため、視覚的に優れていることが示された。そのような青色ノイズパターンは、非周期的で相関のない構造を持ち、低周波数の粒状性がないという特徴を持つ(Ulichney、前掲書、p.233),

【0009】スペクトル空間での青色ノイズの特性と、実空間における青色ノイズパターンの特徴との対応関係を図 68 に示す。同図において、スペクトル空間で低周波数成分が少ないことは、実空間ではドットパターンの粒状性が少ないことに対応し、スペクトル空間で非周期的であることは、実空間では、粗織的ディザ法で見られるような、マスクサイズを周期とする周期的パターンや、入力画像との干渉で生ずるモアレなどの虚像が発生しないことに対応する。即ち、視覚的に好ましいドットパターンであるためにはスペクトル空間で低周波数成分が少ないことと、非周期的であることとの両者が必須である。従って、Ulichneyにより示されたこの理論体系(schene)では、対偶として、青色ノイズでなければ視覚的に好ましくはないと言うことと、その逆とが成立することになる。

【0010】この結果に基づいて、処理速度の速いマスク法で背色ノイズパターンを実現する方法が考案され始めた。先ず、各階調毎に背色ノイズマスクを持つ方法(USP4,920,501、USP 5,214,517)が考案され、次いで関値マトリックスとしての一枚のマスクのみを用いる背色ノイズマスク法(特計公報 第2622429号、USP 5,111,310、USP 5,477,305等)が考案された。さらには、空所/集団(void and cluster)法(USP 5,535,020)や、その改良技術(USP 5,317,418)も考案された。

【0011】青色ノイズマスク法も図68に示された理論体系に基づく二値化法である。同方法に関わるすべての発明(特許公報第2622429号、USP 5,111,310、USP 5,323,247、USP 5,341,228、USP 5,477,305、USP 5,543,941)に記載されているように、同方法により生成される背色ノイズパターンの持つ背色ノイズ特性とは、任意の階調に設定した場合のドットの出力パターン(ドットパターン)が局所的に非周期的(locally aperiodic)かつ等方的(isotropic)で低周波数成分が少ないことを言う。また、任意の階調におけるドットの分布が予め定められた一定の分布を全く持たず、マスク作成のアルゴリズムの持つランダム性にのみ委ねられるという意味で非決定論的であるため、骨色ノイズ特性を持つドットの分布を、ランダム(random)かつ非決定論的(non-deterministic)で非白色ノイズ(non-white noise)特性を持つと

言うこともできる(USP 5,111,310)。 【0012】

【発明が解決しようとする課題】ここで注意しなければならないことは、図68の理論体系は、入力信号に応じて実時間的に二値化処理をした出力信号を出力する誤差拡散法において構築されているので、基本的に出力画面の大きさによらずに青色ノイズ特性を持つドットの分を生成出来ることである。しかし、マスク法の場合は、一定階調の入力画像に対し、マスクの大きさと出力を出力を生成出来ることである。しかし、マスク法の場合は、一定階調の入力画像に対し、マスクの大きさと出力を出力を開びるばブリンタ、の精細度とから決まる大きさ周にでいていていまい。基本的に非周期的(等方的)であるという青色ノイズ特性の理論体系と原理的に矛盾特別であるという青色ノイズ特性の理論体系と原理的に矛盾点を解消をという青色ノイズ特性の理論体系と原理的に矛盾点を解消をいう重大な課題を持つ。先に示した青色ノイズ特性に関わる種々のマスク法においては、この矛盾点を解消する具体的な条件に関する開示は全くなされていない。

【0013】背色ノイズマスク法の持つ上記基本的問題 点と青色ノイズマスク法固有の問題点とから来る該方法 の限界を以下に具体的に示す。

【0014】上記方法が発明された時期、プリンタの精 細度は平均して 300~500dpi 程であった(特許公報 第2 622429号、USP 5,111.310、USP 5,323,247、USP 5,341; 228、USP 5.477.305、USP 5,543.941)。この発明により 開示された青色ノイズマスクの作成法では、階調数を25 6とすると、先ず中央の 128階調目の青色ノイズバター ンを作成する。次ぎに 128階調目より下の階調のドット パターンを作成する系統と128階調目より上の階調のド ットパターンを作成する系統とに分け、次々とそれぞれ の系統における階調のドットパターンを作成してゆく。 全階調のドットパターンが決まれば全間値が定まりマス クが完成する。その際、一つ前の階調までにドットが打 たれてしまっている位置には新たなドットが打てないの で、中央の階調から離れれば離れるほど、ドットの位置 を選択する自由度が減って行き、良好な青色ノイズパタ ーンが得られにくく成る。 図69、70 に、入力画像 の階調数を256、出力画面サイズを256×256画素とした ときの組織的ディザ法の1階調目(図69)と青色ノイズ マスク法の 1階調目(図70)を示す。 因みに集団ドット ディザ法と分散ドットディザ法の1階調目のドットパタ ーンは同一である、分散ドットディザ法に比べ、青色ノ イズマスク法の低階調におけるドットの分布の一様性の 悪さが歴然としていることがわかる。

【0015】 青色ノイズマスク法において、中央の階調で最初の青色ノイズパターンを用意することを止め、低階調、例えば 1階調目で青色ノイズパターンを用意すれば、低階調でより良好な青色ノイズパターンが得られるはずである。そのようにした場合、今度は、高階調になればなる程特性が悪くなり、255階調の特性の悪さは中央の階調から作成し始めた場合の倍程度悪くなることに

なる。このように、この方法において中央の階調から始めるのは、全階調における特性のバランスを考慮したからであり、従って低階調で良好な青色ノイズパターンが得られにくいのは、青色ノイズマスク法固有の問題点である。

【0016】更に、青色ノイズマスク法では、プリンタの精細度が上がると、青色ノイズマスク法の持つ、先に示した原理上の問題点から来る限界が明らかとなる。即ち、青色ノイズマスク法で良好な青色ノイズ特性を得るためにはプリンタの精細度が上がる程マスクが大型化することである。さらに、600~700位i から 1200dpi程度へとプリンタが高精細化するにつれ、分散ドットディザ法固有の周期的パターンが細かくなり、視覚的に感知しにくくなるので、同方法と比べたとき、青色ノイズマスク法における低階調でのドット分布の一様性の悪さが目立つようになるという、同方法固有の問題点も一層顕著に現れることになる。

【0017】このように、従来の背色ノイズマスク法では、低階調におけるドットの分布の一様性が悪いといった欠点があり、更にプリンタの精細度があがると、一様性の悪さが目立つので、それをなくすためには大きなサイズのマスクが必要となり、メモリの容量が大きくなってしまうといった欠点があった。

【0018】本発明は上述した従来技術の課題を解決するものであり、小型のマスクでドット分布の一様性に優れた高面質な画像を得ることができるとともに、高精細プリンタにおいてもマスクサイズを大きくする必要が無く、マスクを記憶しておくためのメモリ容量を小さくすることができる関値マトリックス、及びそれを使用した階調再現方法とその装置の提供を目的とする。

[0019]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するため本発明の階調再現方法は、原画の各画素と閾値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応させて出力画の個々の画素における濃度を三値あるいは多値で表現する階調再現方法において、基準となる大きさの画素区画内に生成するドットバターンがすべての階調で非背色ノイズ特性を持ち、かつ、入力画像を階調処理し、およそ600位に以上の精細度を持つ出力装置により出力した場合に、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しバターン等の虚像が発生しないことを特徴とする。

【0020】又本発明の階調再現方法は、原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応させて出力画の個々の画業における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現方法において、前記マスク単独により生成されるドットパターンが、すべての階調で非许色ノイズ特性を持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好

ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする。

【0021】又本発明の階調再現方法は、原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を三値あるいは多値で表現する階調再現方法において、前記マスク単独により生成されるドットバターンの二次元空間周波数スペクトルが、すべての階調でマスクの持つ周期性に起因する複数の孤立スペクトルを持つと共に、複数の階調で、該階調のドットの分布に弱い不規則性(摂動)を導入し、一次元半径方向のスペクトルに低周波数成分の少ないノイズ成分を持たせることにより、階調処理をした出力画像に、視覚的に好ましくない虚像が発生しないことを特徴とする。

【0022】又本発明の階調再現方法は、原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現するために、同一の関値配列を持った比較的小規模の関値マトリックスを原画全体に対応して二次元的かつ規則的に配列して用いる階調再現方法において、該マスクが、分散ドットディザ法のマスクと同じ大きさのマスク(要素マスク)を複数並べた大きさを持ち、かつ、該マスクにより生成されるドットパターンが、

(1) 各要素マスクに対応する各要素面素区画内のドットの分布が全階調で全く同じとなる要素面素区画の相を持ち、(2)1階調目以降の低階調のうちのいずれかの階調において弱い不規則性、または、擬似周期性が導入され、(3)すべての階調で、すべての要素画素区画内のドットの数が等しく、(4)4n (n は整数) 階調毎に、各要素画素区画を四等分した大きさを持つ四つの部分要素画素区画内のドットの数がすべて等しくなる、ことを特徴とする。

【0023】又本発明の階調再現装置は、原画の各画素 と関値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応 させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは 多値で表現する階調再現装置において、閾値マトリック スを記憶する記憶手段と、前記閾値マトリックスの値を 関値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較する比 較手段と、前記比較手段の比較結果に応じて、二値ある いは多値化されたドットパターンを出力する出力手段と を有し、前記聞値マトリックスは、そのサイズは基準と なる大きさの画案区画より小さいサイズであり、前記基 準となる大きさの画素区画内に生成されるドットパター ンがすべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、入 力画像を階調処理し、およそ600dpi 以上の精細度を持 つ出力装置により出力した場合に、出力画像に、視覚的 に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマス ク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発 生しないことを特徴とする。

【0024】又本発明の階調再現装置は、原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応させて出力画の個々の画案における過度を二値あるいは多値で表現する階調再現装置において、関値マトリックスの値を関値として、原画の各画案の過度と画案毎に比較すると、前記比較手段の比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットパターンを出力する出力手段とも前記関値マトリックスは、前記関値マトリックスは、前記関値マトリックスは、前記関値マトリックスは、前記関値マトリックスは、前記関値マトリックス単独により生成されるドットパターンが、すべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする。

【0025】又本発明の階調再現装置は、原画の各画案 と閾値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応 させて出力画の個々の画案における濃度を二値あるいは 多値で表現する階調再現装置において、閾値マトリック スを記憶する記憶手段と、前記閾値マトリックスの値を **閾値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較する比** 較手段と、前記比較手段の比較結果に応じて、二値ある いは多値化されたドットパターンを出力する出力手段と を有し、前記閾値マトリックスは、単独の閾値マトリッ クスにより生成されるドットパターンの二次元空間周波 数スペクトルが、すべての階調で閾値マトリックスの持 つ周期性に起因する複数の孤立スペクトルを持つと共 に、複数の階調で、該階調のドットの分布に弱い不規則 性(摂動)を導入し、一次元半径方向のスペクトルに低周 波数成分の少ないノイズ成分を持たせることにより、階 調処理をした出力画像に、視覚的に好ましくない虚像が 発生しないことを特徴とする。

-

【0026】又本発明の階調再現装置は、原画の各画素 と閾値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応 させて出力画の個々の画案における濃度を二値あるいは 多値で表現する階調再現装置において、関値マトリック スを記憶する記憶手段と、前記閾値マトリックスの値を 閾値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較する比 較手段と、前記比較手段の比較結果に応じて、二値ある いは多値化されたドットパターンを出力する出力手段と を有し、前記閾値マトリックスは、分散ドットディザ法 のマスクと同じ大きさのマスク(要素マスク)を複数並べ た大きさを持ち、かつ、生成されるドットパターンが、 (1) 各要素マスクに対応する各要素画素区画内のドット の分布が全階調で全く同じとなる要素画素区画の組を持 ち、(2)1階調目以降の低階調のうちのいずれかの階調に おいて弱い不規則性、または、擬似周期性が導入され、 (3)すべての階調で、すべての要素面案区面内のドット の数が等しく、(4)4n (n は整数) 階調毎に、各要素画 **素区画を四等分した大きさを持つ四つの部分要素画素区** 画内のドットの数がすべて等しくなる、ことを特徴とす

る.

【0027】又木発明の閾値マトリックスは、原画の各画素における濃度を二値あるいは多値のデータに変換する際に用いられる閾値マトリックスにおいて、そのサイズは基準となる大きさの画素区画より小さいサイズであり、前記基準となる大きさの画素区画内に生成されるドットパターンがすべての階調で非背色ノイズ特性を持ち、かつ、入川画像を階調処理し、およそ600位に以上の精細度を持つ出力装置により出力した場合に、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴とする。

【0028】又本発明の閾値マトリックスは、原画の各 画素における濃度を二値あるいは多値のデータに変換す る際に用いられる関値マトリックスにおいて、前記関値 マトリックス単独により生成されるドットパターンが、 すべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、出力画 像に、視覚的に好ましくない程のコントラストを有する モアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン 等の虚像が発生しないことを特徴とする。又本発明の閾 値マトリックスは、原画の各画素における濃度を二値あ るいは多値のデータに変換する際に用いられる閾値マト リックスにおいて、単独の閾値マトリックスにより生成 されるドットバターンの二次元空間周波数スペクトル が、すべての階調で関値マトリックスの持つ周期性に起 因する複数の孤立スペクトルを持つと共に、複数の階調 で、該階調のドットの分布に弱い不規則性(摂動)を導入 し、一次元半径方向のスペクトルに低周波数成分の少な いノイズ成分を持たせることにより、階調処理をした出 力画像に、視覚的に好ましくない虚像が発生しないこと を特徴とする。

【0029】又本発明の関値マトリックスは、原画の各 画素における濃度を二値あるいは多値のデータに変換する際に用いられる関値マトリックスにおいて、分散ドットディザ法のマスクと同じ大きさのマスク(要素マスク)を複数並べた大きさを持ち、かつ、生成されるドットバターンが、(1)各要素マスクに対応する各要素画素区画内のドットの分布が全階調で全く同じとなる要素画素区画の組を持ち、(2)1階調目以降の低階調のうちのいずれかの階調において弱い不規則性、または、擬似周期性が導入され、(3)すべての階調で、すべての要素画素区画内のドットの数が等しく、(4)4n(n は整数)階調毎に、各要素画素区画を四等分した大きさを持つ四つの部分要素画素区画内のドットの数がすべて等しくなる、ことを特徴とする。

【0030】又木発明の記憶媒体は、原画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応させて出力画の個々の画案における濃度を二値あるいは多値で表現する階割再現処理を制御する制御プログラムをコンピュータ読み出し可能に記憶する記憶媒体であって、

基準となる大きさの画素区画より小さいサイズであり、前記基準となる大きさの画素区画内に生成されるドットパターンがすべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、入力画像を階調処理し、およそ600dpi 以上の精細度を持つ出力装置により出力した場合に、出力画像に、規覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像が発生しない関値マトリックスと、前記間値マトリックスの値を関値として、原画の各画素の濃度と画素毎に比較して、前記比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットパターンを出力するよう制御するモジュールを含むことを特徴とする。

【0031】又本発明の記憶媒体は、原酉の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値で表現する階調再現処理を制御する制御プログラムをコンピュータ読み出し可能に記憶する記憶媒体であって、対して、すべての階調で非青色ノイズ特性を持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好ましくない程のコントを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰りして、原画の各画素の濃度と画素毎に比較して、前記比較結果に応じて、二値あるいは多値化されたドットバターンを出力するよう制御するモジュールを含むことを特徴とする。

【0032】又本発明の記憶媒体は、原画の各画素と閲 値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応させ て出力画の個々の画素における濃度を二値あるいは多値 で表現する階調再現処理を制御する制御プログラムをコ ンピュータ読み出し可能に記憶する記憶媒体であって、 単独の閾値マトリックスにより生成されるドットパター ンの二次元空間周波数スペクトルが、すべての階調で聞 値マトリックスの持つ周期性に起因する複数の孤立スペ クトルを持つと共に、複数の階調で、該階調のドットの 分布に弱い不規則性(摂動)を導入し、一次元半径方向の スペクトルに低周波数成分の少ないノイズ成分を持たせ ることにより、階調処理をした出力画像に、視覚的に好 ましくない虚像が発生しない閾値マトリックスと、前記 閾値マトリックスの値を閾値として、原画の各画素の湯 度と画素毎に比較して、前記比較結果に応じて、二値あ るいは多値化されたドットパターンを出力するよう制御 するモジュールを含むことを特徴とする。

【0033】又木発明の記憶媒体は、原画の各画索と関値マトリックス(マスク)の各要素とを 1対1 に対応させて出力画の個々の画素における温度を二値あるいは多値で表現する階調再現処理を制御する制御プログラムをコンピュータ読み出し可能に記憶する記憶媒体であって、分散ドットディザ法のマスクと同じ大きさのマスク(要

素マスク)を複数並べた大きさを持ち、かつ、生成され るドットパターンが、(1)各要素マスクに対応する各要 素画素区画内のドットの分布が全階調で全く同じとなる 要素画衆区画の組を持ち、(2)1階調目以降の低階調のう ちのいずれかの階調において弱い不規則性、または、挺 似周期性が導入され、(3)すべての階調で、すべての要 素画素区画内のドットの数が等しく、(4)4n (n は整数) 階調毎に、各要素画素区画を四等分した大きさを持つ 四つの部分要素画素区画内のドットの数がすべて等しく なる、関値マトリックスと、前記閾値マトリックスの値 を園館として、原画の各画衆の濃度と画素毎に比較し て、前記比較結果に応じて、二値あるいは多値化された ドットパターンを出力するよう制御するモジュールを含 むことを特徴とする。また本発明の階調再現装置は、原 画の各画素と関値マトリックス(マスク)の各要素とを1 対1に対応させて出力画の個々の画素における濃度を二 値あるいは多値で表現する階調再現装置であって、閾値 マトリックス単独により生成されるドットパターンの非 等方性において、すべての階調で該非等方性の平均値が 3dB以上を示し、極大値が10dB以上を示すスペクトル を持ち、かつ、出力画像に、視覚的に好ましくない程の コントラストを有するモアレやマスク自体に起因する… 定の繰り返しパターン等の虚像が発生しないことを特徴 とする。

【0034】これら本発明によれば、小型のマスクでドット分布の一様性に優れた高画質な画像を得ることができるとともに、高精細プリンタにおいてもマスクサイズを大きくする必要が無く、マスクを記憶しておくためのメモリ容量を小さくすることができる。

[0035]

【発明の実施の形態】以下、実施の形態を説明する。

【0036】本発明は、従来型のインクジェットプリンタやバブルジェット(BJ) アリンタなどのように、最も単純な場合、出力画像の画業毎にインクの液滴を紙に打つかずたないかを定めて画像を形成する装置において中間調を表現するために適用でき、同様に、各画業について、明か暗かで画像を表示する類の液晶表示装置等においても中間調を表現するために好適に用いられる。

【0037】より一般的には、連続階調の白黒又はカラー画像を濃度に関して二値あるいは多値に変換して出力するインクジェットプリンタ等をはじめレーザービームブリンタ、ファクシミリや印刷機などの機器においても中間調を好ましく表現するために用いられる。

【0038】さらに、本発明は、プリンタ等の出力装置の持つ精細度がおよそ600dpi以上、1200dpi程度と高くなればなる程、より効果的に用いられる。

【0039】本実施の形態の理解を容易にするため、従来の背色ノイズマスク法の課題を更に詳細に説明し、その後実施の形態のポイントを説明する。

【0040】課題で述べた大型の青色ノイズマスクを必

哭とする理由を以下に説明する。

【0041】再現すべき階調数を 256とし、精細度が60 Odpiの市販のインクジェットプリンタを用いて実験を行 なった。開示された青色ノイズマスクの作成法(USP 5.1 11,310等、及び、T. Mitsa and K.J.Parker, J. Opt. Soc. Am., 9, 1920-1929 (1992)) に従って、大きさか2 36×256(画面上では10.8㎜角)、128×128(画面上で5.4㎜ n角)、64×64(画面上で2.7mm角)の 3種類の骨色ノイズ マスクを試作した。先ず視覚的に評価することとし、対 象となる画像は、大きさが18.5mm角で、個々の画面が一 定の階調を持ち、濃度が階段状に変化するグレースケー ルとした。そのようにして試作したドットパターンを、 マスクの大きさの順に図7 1 (256×256)、図7 2 (128× 128)、図73(64×64) に示した。それぞれ、上段左か ら右に 30、31、32階調目、中段左から右に40、41、42 階調目、下段左から右に50、51、52階調目のドットバタ ーンである。ただし、同図はアリンタで打ち出した原画 の複写機によるコピーであり、コピー段階での非線形特 性のため濃淡のコントラストが若干変化している。

【0042】256×256の大きさの青色ノイズマスクは一両面あたりマスク約4個分を含んでいるので、10.8mm 角の青色ノイズパターンが約4個弱合まれているはずであるが、図71でわかるように不定型のムラはあるものの周期的パターンは感知されず、他の階調でも同様であった。

;ġ

【0043】しかし、128×128の大きさのマスクでは、 図72 に見られるように多くの階調でマスク 9個分の パターンが二次元的に繰り返されている様子が感知され、実用には供し難い程度であった。

【0044】64×64の大きさのマスクでは、図73に見られるようにより多くの階調でこの現象がさらに顕著に現れ、本来ならば一様にグレーとして見られるべき個々の画面に、2.7mm 周期の格子状の模様がはっきり感知された。マスクの大きさが小さくなると、その中に生じるドットの分布のムラの変化率が相対的に大きくなり、そのムラの変化の繰り返しが、ちょうど人間の目に感知し易い数mmの周期となるからである。

【0045】以上の結果から、600dpiのインクジェット プリンタを用いた場合の背色ノイズマスクの最適な大き さは、256×256 であることが分かった。

【0046】プリンタの精細度が300~500dpi と低い場合、例えば、具体的に300dpiの場合には、分散ドットディザ法におけるマスク自体の持つ規則的パターンによる虚像がより顕著になる反面、128×128の大きさの青色ノイズマスクに関しては図72に示されたような虚像はより感知し難くなった。しかし、プリンタの精細度が600dpiに上がると、マスクー枚分が作るドットパターンの大きさが小さくなり、分散ドットディザ法の周期的虚像がより感知し難くなる一方で、逆に図72に見られるように、青色ノイズマスク法による虚像はより感知し易

くなることが明らかとなった。即ち、青色ノイズマスク 法で良好なドットパターンを得るためにはアリンタの精 細度が上がる程大型のマスクが必要であることが視覚特 性の面からわかる。

【0047】次ぎに、これらのマスクを用いて生成されたドットパターンが青色ノイズ特性を持つか否かをスペクトル空間で評価した。出力画面サイズを、大きさが256×256のマスクがつくる画面と同じにした。この大きさは、Ulichney(前掲書、p.54)が誤差拡散法によるドットパターンの一次元周波数特性Pr(fr)(二次元周波数空間において中心半径 frの輪帯状に区分けした領域内で平均したパワースペクトルを半径方向 fr を横軸にして表示)と、非等方性(anisotropy:Ulichney、前掲書 p.56)とを調べた際に用いた画面の大きさに等しい。

【0048】Uliclineyは非等方性を誤差拡散法において 次ぎのように定義した。

[0049]

【外1】

Anisotropy =
$$\frac{s^2(fr)}{P^2(fr)}$$
 (1)

【0050】ここで、s2(fr)は一次元パワースペクトル Pr(fr)の分散、Pr2(fr)はパワースペクトルの自乗であ る。ただし、誤差拡散法の場合は、同じ階調であって も、発生させる度にドットパターンが異なるので、256 ×256の画面10サンプルのパワースペクトルを計算し、 相互に独立であるとの仮定のもとで足し合わせ、合計を サンプル数10で割り誤差拡散法におけるパワースペクト ルと定義する。このとき、非等方性の値は完全に等方的 な場合が -10dBとなる。ここで、等方的であれば非周期 的であると言えるが、その逆は必ずしも真ではないこと に注意すべきである。逆の言い方をすれば、周期的であ れば必ず非等方的となる。先にも示したように、Ulichn eyにより定められた青色ノイズパターン、従って視覚的 に好ましいパターンであるためには、等方的であること よりも非周期的で相関のないことが要件となっているこ とに注意しなければならない。

【0051】Illiclineyの記述(前掲書 \$8.2)によれば、Floyd と Steinbergの誤差拡散法では、いくつかの階調では等方的で良好なドットパターンが得られるものの多くの階調におけるドットパターンに上記誤差拡散法特有の各種の虚像の原因となる強い非等方性が存在する。スペクトルの非等方性を示すグラフ(Ulichney、前掲書、Fig. 8.8)によれば、階調数度を1に規格化したとき、参照し得る全7階調で全周波数帯域にわたる非等方性の平均値が一位B以上を示す。また、非等方性の極大値は、6階調で0dB以上、g=7/8で-2dBを示す。なお、最低周波数や最高周波数近傍では、ドットの数が少ないため、非等方性の値自体が大きく変動するので、それらを除外する必要がある。どれか一つの周波数でも非等方性の値が0dB以上を示すスペクトルがあれば、そのようなパタ

ーンは特に非等方的 (especiallyanisotropic)であるとする(Ulich-ney、前掲書 p.242)。実際、非等方性の平均値が-6dB以上でかつ極大値がOdB以上を示す6階調については、例外なく相関のある虚像 (correlated artifacls) が認められる。但し、x =7/8では、極大値はOdBに達してはいないが、平均値のレベルは、-5.5dBと高く、弱い虚像が認められる。

【0052】また、Floyd と Steinberg による誤差拡 散法において存在するいくつかの虚像を減少させた Jar vis らの誤差拡散法においても、高ないし低階調域での 方向履歴現象(directional hysteresis)は増加し、中階 調領域での画素の一層の集団化が起こる(Ulichney、前 掲書、88.2.1、p.253)。この誤差拡散法においてはFlo yd と Steinberg による誤差拡散法に比べれば全体的に 非等方性が弱くなっている。因みにJarvis らによる誤 差拡散法では、参照し得る5階調すべてにおいて非等方 性の平均値が -7dB強から-4dB程度の範囲にあり、平均 すると-6dB程度となっている。非等方性の平均値が -7 dB強以上でかつ極大値が0dB以上を示す3階調については 例外なく虚像が認められる。従って、両誤差拡散法を通 じて、非等方性の平均値が -7dB強以上で、極大値が0dB 以上を示すスペクトルがあるドットパターンには例外な く虚像が認められると言うことができる。

【0053】以上の記載に基づくならば、非等方性の極 大値がOdB以上で平均値が -7dB強以上となるような誤差 拡散法のドットパターンは、背色ノイズ特性を持つとは 言えず、非骨色ノイズ特性を持つとしなければならな い、なぜなら、Ulichney (前掲書) に基づいて図 68に 示したように、本来、青色ノイズ特性を持つドットパタ ーンであれば、上記のような虚像は発生しないからであ る. 従って、パワースペクトルのいかんにかかわらず、 非等方性に関する極大値と平均値の値のみに基いて例外 なく非青色ノイズ特性を持つと判定できることになる。 【0054】さらに、非等方性に関する青色ノイズ特性 の限界は、Jarvis らによる誤差拡散法で階調数8 =1/8 の場合を参考にするなら、低周波数成分が少ないことを 前提として、非等方性の平均値が -7dB以下となるドッ トパターンであるとして良かろう。因みに、この階調の 非等方性の極大値はかなり高く-2.5dBである。視覚的に 好ましいg =1/8を青色ノイズ特性の限界に選んだ理由を 以下に示す。g =1/8のパワースペクトルを見るとUlichn eyの示す青色ノイズの理想的なパワースペクトルの形状 (Ulichney、前掲書p. 238、Fig. 8.3) に極めて近いこ とがわかる。但し、同図と比較しても、主周波数(Prin cipal Frequency) fgの位置に極めて高いピークが存在 し、その周波数位置で非等方性も極大値をとる。非等方 性の平均値も-7dBと、この誤差拡散法が示す非青色ノイ ズ特性の非等方性に関する平均値の下限-7dB強に極めて 近く、比較的高い非等方性を示す。非等方性に関するこ れらの値がより大きくなるとドットパターンの視覚特性 はかなり急速に悪化し、明らかに非青色ノイズ特性を持つようになるが、逆に非等方性の平均値が、-7dB以下となり、-10dB (等方的)に近づいても、後に示すようにやはり視覚特性が悪化する方向にある。即ち、Jarvisらの誤差拡散法のこの階調は、結果的に見て、視覚特性の面から非等方性が最も高いレベルで最適化されている可能性が極めて高い。非等方性の極大値が非青色ノイズ特性を示すレベルよりさらに一層高くなっても、分散ドットディザ法の場合は、例えば、600からのプリンターで同じく8=1/8 (全階調数を256としたとき32階調目)におけるドットパターンを作成すればわかるように、視覚的には極めて好ましく感じられる。だからと言って青色ノイズ特性を持つわけではない。

【0055】Ulichney(前掲書 p.272、及び Fig. 8.1 5)が、骨色ノイズ特性を持つとして具体例を示した単一 の重みを持った確率的摂動誤差拡散法(Perturbed Error Diffusion with a Stochastic Error Filter with One Weight)のスペクトルは、階調数g を1に規格化したと き、上記の凶(Fig. 8.15)に示された全ての階調 (g =1/ 32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 の 6階調)で以下の条件 を満たすとしている。(1) 非常に低い非等方性 (very 1 ow anisotropy)を示す。(2) 平坦な青色ノイズ領域(fla t blue noise region)を持つ。(3)カットオフ周波数 fg (cutoff at fg)を持つ。ここで、(1)は非等方性に関 するスペクトル特性、(2)と(3)はパワースペクトルに関 する特性である。従って、青色ノイズ特性を持つか否か は、非等方性にしろパワースペクトルにしろ、どちらか 一方のスペクトルからだけでは評価できない。ただし、 すでに述べたように、非骨色ノイズ特性を持つか否か は、非等方性の極大値と平均値の値からだけでも判定で きる。上記青色ノイズの定義に照らし合わせても、非等 方性が特に非等方的とされるレベルであれば、明らかに 上記特性の(1)、「非常に低い非等方性 (very low anis otropy)を示す。」に反することがわかる。いずれにし ても、青色ノイズ特性とは、プリンターの解像力やドッ トパターンの階調数gのいかんに関わりなく、上記(1)~ (3)のスペクトル特性のみによって定義されていること がわかる。

【0056】すべての階調で上記 3条件が文字通り満たされればそのドットパターンは青色ノイズ特性を持つと言えるが、厳密には、Ulichneyの示した前記預動誤差拡散法も8 = 1/2 では条件(2)を満たさず、低周波数成分がかなり多い。その結果、ドットパターンには粒状性が目立つことになる。しかし、Ulichneyに従い白色ノイズと比較すれば、条件(2)からのこの程度のずれは、青色ノイズ特性として許容される範囲とされることになる。このように、Ulichneyの定義した青色ノイズ特性に基いているため、摂動誤差拡散法は、全ての階調で周期性や相関のある虚像は厳しく抑制し、モアレが発生するような恐れは皆無ではあるが、粒状性の抑制力は弱いという

特徴を持つことになる。

【0057】前記摂動誤差拡散法では、6階調の内 g = 1/8. 1/4. 7/8 の 3階調での非等方性の値はほぼ全周波 数帯域で −10±2.5dB の範囲にあり、平均値として − 10個を示すので等方的と言える。しかし、残りの3階調 では、帯域によっては平均値自体が - 10dBより大き く、明らかに非等方性を示し、非等方性の強い階調では 極大値が-4dB、平均値が -7dB程度である。ただし、 それらの非等方性はすべて主周波数fgよりも低周波数帯 域に存在し、パワースペクトルで見ても、特定の周波数 にピークを持つわけではないので、虚像らしきものは感 知されない。先に、青色ノイズ特性の限界を、Jarvis らによる誤差拡散法で階調数g =1/8の場合に設定した。 摂動誤差拡散法の階調数g =1/8の場合を見ると非等方性 の平均値はほぼ-10dBと良好な等方性を示すが、パワー スペクトルを見ると低周波数成分が多く、Jarvis らの 誤差拡散法における階調数8 =1/8のドットパターンと比 較すると、粒状性は大幅に悪化していることがわかる。 【0058】マスク法で得られたドットパターンは、階 調が同じであれば常に同じパターンが繰り返し得られる ので、10サンプルを取り平均する操作は不要となる。従 って、非等方性に関する極大値と平均値のそれぞれにつ いて、誤差拡散法における値とマスク法における値の対 応関係を調べる必要がある。そのため、FloydとSteinbo rgによる誤差拡散法と Jarvis らの誤差拡散法につい て、誤差拡散法としてのそれらの値と、10サンプルの中 の個別のサンプルに関するそれらの値との対応関係を調 べた、誤差拡散法でも、実際に眼で見るドットパターン は個々のサンプルであるから、サンプル毎の非等方性や パワースペクトルは、視覚特性とより直接的な対応関係 を持つことになる。

【0059】先ず、誤差拡散法での非等方性が、ビーク 値で5dB程度以下の場合には、すべてのサンプルで、個 々のサンプルの非等方性の平均値の、等方性の基準値0 心のよの値は、10サンプルを総合した非等方性の平 均値の、基準値 -10dBからの差の値の半分よりは小さい 値を示すことがわかった。このことは、誤差拡散法とマ スク法とで非等方性を比較する場合、それぞれの平均値 の基準値からの差の値として、マスク法が誤差拡散法の 値の半分の値を示せば、二つの方法の非等方性はほぼ等 しいか、より厳密に言えば、マスク法の非等方性がやや 上回るとして良いことを意味する。次に、誤差拡散法で 特に非等方的とされる極大値OdB (基準値 - 10dBに対し +10dB) が、個々のサンプルではどのような値をとるか を調べた。結果のみを記すと、10サンブルの中の個別の サンプルによって値がばらつくが、その範囲は5dB±1dB =4個へも明の中に収まった。また、誤差拡散法で例外な く虚像が出る場合の非等方性の平均値は極大値がOdB以 上であるという前提で、基準値-10dBに対し3dB強上の-7dB強であったから、マスク法でのその平均値は1.5dB強

未満となる。実際にその平均値を10サンプルの各々につ いて計算したところ最低値は0.6dBとなった。また、青 色ノイズ特性の限界に関して、Jarvis らによる誤差拡 散法で階調数g =1/8の場合を参考に、非等方性の平均値 が -7dB以下、極大値は -2.5dBとなるドットパターンと 定めた、従って、マスク法における青色ノイズ特性の限 界は、非等方性の平均値については1.5dB未満となるド ットパターンであると言うことになる。実際にこの平均 値を10サンプルの各々について計算したところ最大値は 0.9dBとなった。この値は、非青色ノイズ特性を持つベ きサンプルの平均値の下限0.6dBを上回っている。極大 値は、10サンブルの中の個別のサンプルについて、2.50 Bから4dBの範囲でばらつき、平均値は3.2dBであった。 ただし、10サンプル中9サンプルで誤差拡散法としての 非等方性の極大値を持つ周波数としてのfgより低周波数 側で、サンプル毎に異なる周波数に極大値が現われ、そ の最大値は5.4dBに達した。だからといって虚像が知覚 される訳ではない.

【0060】その理由は次ぎのように考えられる。誤差 拡散法の場合、10サンプルすべてのドットパターンが異 なる。しかも、例えば上記極大値5.4dBを示すスペクト ルは特定の1サンプルにおいて主周波数fgよりも低周波 数帯域にあり、パワースペクトルで見ても、その周波数 にピークは見あたらない。このことは、その非等方性に 関与するドットの数が非常に少ないことを意味するの で、虚像は二重に感知し難くなる。従って、個々のパタ ーンの極大値については、誤差拡散法で極大値を持つ周 波数にのみ注目すれば良い。ただし、数値的には非等方 性が同等であっても、視覚的にはマスク法の場合の方が 虚像が感知され易いという意味で非等方性が強い。なぜ なら、マスク法では、マスク一枚分に相当する全く同じ ドットパターンが繰り返されるので、ドット分布の偏り がより目立つからである。このドット分布の偏りの目立 ち易さは、すでに示したように、マスクの大きさが小さ くなるほど顕著になる。従って、マスク一枚分のドット パターンが数値的に誤差拡散法と同等の非等方性を示す 場合でも、以上のような視覚特性を加味した非青色ノイ ズ特性は、マスク法の方が強く、マスクが小さければ小 さい程一層強いことになる。

【0061】さらに視覚特性との関連で述べるならば、 たとえマスクの大きさが同じであっても、出力装置の精 細度が上がる程、虚像が目立ち易くなる。

【0062】話をもとにもどすと、マスク法においても、非等方性に関する極大値と平均値の値のみから、例外なく非青色ノイズと判定できる。誤差拡散法でOdBに相当する極大値はマスク法では5dB±1dB=4dB~6dBの範囲に含まれたから、極大値については4dB以上の値を示せば非肯色ノイズ特性と判定して良いことにはなる。しかし、Jarvis らの階調数s=1/8における個々のパターンの極大値の最大値は4dBであったから、極大値のみ

で言えば、本来青色ノイズであるパターンが非青色ノイ ズであるための条件を満たすことになる。そのような例 を排除すために、極大値が4dB以上、好ましくは5dB 以上という条件の外に、非等方性の平均値に関する条件 を加えなければならない。ところで、非等方性の平均値 については、非青色ノイズ特性を示す個別サンプルに関 する下限値0.6dBと、青色ノイズ特性の限界を示す誤差 拡散法のサンプルの上限値とが逆転してしまっていた。 従って、確実な判定をするためには、下限値を上限値0. 9dBより上に設定する必要がある。そこで、非等方性の 極大値が3dBで、平均値がほぼ -5.5dBである誤差拡散法 のドットパターンについて個別サンプルの平均値を調べ たところ、下限が1.2dbとなった。新たにこの値を非青 色ノイズ特性を示すドットバターンに関する非等方性の 平均値の下限とする。なお、非等方性の-5.5㎝という平 均値は、極大値が0dBに達していないにも拘わらず弱い ながらも虚像が見られるという意味で非青色ノイズ特性 を示したFloydとSteinbergの誤差拡散法のg =7/8におけ る平均値に相当する。このように、マスク法においても 非等方性に関する二つの値にのみ基いてドットパターン が非骨色ノイズ特性を持つという判定を下すことが出来 る。その場合、誤差拡散法での二つの値は、等方的な場 合の基準値をOdBとしたとき、極大値が10dB以上、平均 値が3dB強以上であったが、マスク法では、極大値が4dB 以上、好ましくは5dB以上で、平均値が1.2dB以上という 条件になる。誤差拡散法においてUlichneyが定義した青 色ノイズの3特性のうち、(1) の「非常に低い非等方 性」とは、マスク法においては上記二つの値を基準とし なければならない。いずれの中間調処理方法にしろ、UI ichneyによる青色ノイズ特性の定義に従えば、青色ノイ ズ特性を持つか否かは、非等方性にしろパワースペクト ルにしろ、どちらか一方のスペクトルからだけでは判定 できない。個別サンプルが比較的良好な青色ノイズパワ ースペクトルを示すにも拘わらず、誤差拡散法としての 非等方性の極大値が非青色ノイズであることを示す実例 を以下に示す。Jarvisらの誤差拡散法におけるg = 1/16 の非等方性の極大値は、約1㎝を示すので非青色ノイズ であり、実際、ドットパターンには方向履歴現象による 虚像が存在する。この階調において個別パターンのパワ ースペクトルを計算したところ、10サンプル中2サンプ ルで比較的良好な青色ノイズパワースペクトルを示し た。この事実は、明らかに、マスク法においても青色ノ イズか否かをパワースペクトルの特性のみでは定義でき ないことを示す。

【0063】青色ノイズ特性を示す摂動誤差拡散法の場合では、参照できる 6階調のうち、3階調は等方的、2階調では、平均値の基準値からの差の値が1dB以下、非等方性の強い階調でもその値が1.5dB程度であったので、マスク法の場合、非等方性の平均値で言えば、それが0.8dB未満であれば、摂動誤差拡散法と同等の青色ノ

イズ特性を示すと言うことができよう。

【0064】ところで、青色ノイズマスク法で得られるドットパターンは、同方法に関わるすべての発明(特許公報 第2622429号、USP 5.111,310、USP 5.323、247、USP 5.341.228、USP 5.477,305、USP 5.543,941)に記載されているように、Ulichuneyによる摂動誤差拡散法のそれより等方的であるとされる。試作した 3種類の大きさの青色ノイズマスクのそれぞれについて、先ずマスク 1枚分だけのドットパターンを生成してスペクトルを評価し、次ぎに周波数特性を誤差拡散法と比較する際の基準サイズである 256×256の画面にドットパターンを生成してスペクトルを評価した。

【0065】図74 に 128×128の大きさの背色ノイズマスク1枚分の32階調目のドットパターンに関する一次元パワースペクトル、図75 に非等方性(anisotropy)を示す。

【0066】一次元パワースペクトルは低周波数成分が少なく、非等方性は全帯域の平均値として OdB を示すので、青色ノイズ特性を持つと言えよう。しかし周波数毎に見ると、OdB を中心とする振れがあり、非等方性の高いスペクトルの極大値は4dBを示す。この値自体は、Ulichney により示された摂動誤差拡散法のそれより非等方的である。他の階調においても同様の特性を示したので、128×128の大きさの青色ノイズマスク 1枚分だけのドットパターンの非等方性は平均値の意味で摂動誤差拡散法より等方的である。

【0067】図76 に 128×128の大きさの骨色ノイズマスクで 256×256の画面に生成した 32階調目のドットパターンに関する一次元パワースペクトル、図77 に非等方性を示す。なお、256×256の骨色ノイズマスクに関する値を破線で示した。先ず、破線に注目すると極めて良好な骨色ノイズ特性を示しており、特に非等方性はの間±1.5dB の範囲にあり、他の階調においても同様の特性を示したので、256×256の骨色ノイズマスク法は摂動誤差拡散法より等方的で良好な骨色ノイズ特性を持つと言える。

【0068】128×128の大きさの背色ノイズマスクに関しては、一次元パワースペクトルのノイズ成分に鋭いビークを持った孤立的スペクトルが多数乗っており、特に高周波数領域では孤立的スペクトルのみの様相を呈している。非等方性は、平均値として9dB程度を示し、極大値として10dBを越すスペクトルがすべて10dBを越す値を示すことを考慮すると、この青色ノイズマスクによる256の画面サイズでのドットパターンは極めて高い非等方性を示すことになるので、青色ノイズパターンではあり得ない。

【0069】以上をまとめると、128×128の大きさの骨色ノイズマスクの場合、マスク1枚分のドットパターンは非等方性が平均値の意味で 0個を示すので骨色ノイズ

特性を示すと言えようが、256×256の画面に生成したドットパターンは、青色ノイズ特性を持たないという結論を下すことが出来る。

【0070】図78 に 64×64の大きさの背色ノイズマスク1枚分の 32階調目のドットパターンに関する一次元パワースペクトル、図79 に非等方性(anisotropy)を示す。

【0071】また、図80 に 64×64の大きさの青色ノイズマスクで 256×256の画面に生成した 32階調目のドットパターンに関する一次元パワースペクトル、図81 に非等方性を示す。256×256の青色ノイズマスクに関する値を破線で示した。他の階調においても両図と同様の特性を示した。

【0072】図78 と図79 によれば、64×64の大きさの青色ノイズマスク1枚のみによるドットバターンは非等方性が平均値の意味で 0dBを示すので青色ノイズ特性を示すと言えようが、極大値として4dBを示すスペクトルが複数本存在するので、青色ノイズマスク法では、マスクが小さくなる程、ドットパターンの偏りが大きくなると言える。

【0073】図80 によれば、このマスクにより256×256の画面に生成したドットパターンは、非等方性の平均値が14dBにも達し、青色ノイズ特性を持たない。

·. 9

【0074】青色ノイズ特性とは、本来Ulichney により示された基準サイズ、256×256画素、のドットパターンに関して定義されている。この実験での64×64と128×128の大きさの青色ノイズマスクは、マスク1枚分のドットパターンは背色ノイズ特性を示すが、両者共基準サイズ内に生成されたドットパターンの周波数特性はこの定義から外れるので、Ulichney による摂動誤差拡散法のそれより等方的であるとする明細書(USP5,111,310等)の記載と異なり青色ノイズ特性を持たない。以上のスペクトルに関する評価結果と、先の視覚的評価結果とを突き合わせて見る。

【0075】開示された宵色ノイズマスク法により得られた異なる大きさの三枚の青色ノイズマスクの内、マスクサイズが256×256より小さい場合は、マスクー枚分によって生成されるドットパターン自体の等方性が、平均値の意味で摂動誤差拡散法より良くても、256×256両素の標準画面サイズ内のドットパターンは極めて強い非常色ノイズ特性を示したが、視覚的にも、偏りのある小パターンの繰り返しが虚像として感知される結果となった。良好な青色ノイズパターンが得られるのは、等方性が摂動誤差拡散法を明確に上回る256×256の大きさの青色ノイズマスクのみであった。

【0076】以上より、マスクー枚分の非等方性が平均 値として等方的であることを示しても、原理上誤差拡散 法と異なり同じパターンが繰り返されるマスク法におい ては、パターンの規模が小さくなると、ドット分布のわ ずかな頂り、即ち濃度ハラ、が目に敏感な周波数で繰り 返し現れる結果、視覚的には虚像として感知されること がわかった。

【0077】青色ノイズ特性に関わる理論体系を示した図68では、対偶において、「青色ノイズスペクトルを持たなければ、ドットパターンは視覚的に好ましくはない」ことを示している。即ち、青色ノイズマスク法も、基本的には図68に示された理論体系に従っているので、256×256の基準となる大きさの画面より相当に小さなマスクの場合は、その対遇に忠実に従っていたことがわかる。

【0078】以上の検討結果より認差拡散法で定義された青色ノイズ特性を青色ノイズマスク法で実現する際の周期性に関する原理的矛盾を解決するためには、少なくとも摂動誤差拡散法の等方性より良好な等方性を得るために、自由度の大きい大型のマスクを用いなければならないということが明確に証明された。分散ドットディザ法のマスクサイズは16×16=256であったから、600dpiのプリンタでの実用的な青色ノイズマスクサイズ 256×256は、その 256倍もの大きさとなる。

【0079】256×256のマスクサイズの青色ノイズマスクで生成した256×256の画面サイズでのドットパターンの非等方性は、摂動誤差拡散法より良好な値を示した。しかし理論的には、そのドットパターンに関し、それより大きい、例えば 512×512の画面サイズで非等方性を評価すると 10個を超える値を示し、青色ノイズ特性を持たない。それにも関わらず視覚的には虚像が感知されないので、図68に示した青色ノイズ特性の理論体系に従ってはいないかのように見える。

【0080】このような場合には、図68の理論体系は、ドットパターンがマスク法のような周期性を持たない誤差拡散法に関し定められたものであって、その周波数特性を評価する際の妥当な大きさとして256×256の画面サイズを用いたということを想起する必要がある。即ち、図68の理論体系は、それをマスク法に適用した場合は、256×256の画面サイズのドットパターンでスペクトルを評価して、摂動誤差拡散法より優れた等方性、一様性を持てば、それが目に敏感ではない長周期で繋ぎ目なしに繰り返されても視覚的に感知されないことを示しているとするべきである。

【0081】逆に言えば、摂動誤差拡散法より高い非等方性、即ちドット分布の偏りを持つドットパターンは、その偏りが視覚的に敏感な問隔で分布すれば、虚像として感知され得ることを示していることになる。600dpiのプリンタでの実験はまさにこの事実を証明したことになる。

【0082】ところで、開示された別の青色ノイズマスクの作成法(USP 5.477,305)では、入出力特性の非線形の写像を可能にするため、累積型分布関数を変更するのに十分な自由度を持つ大きさ、例えば、256階調では256×256のマスクを必要とすることが述べられている。他

方、すでに示したように、青色ノイズマスク法の発明で は、Ulichneyの示した摂動誤差拡散法よりも等方的な青 色ノイズパターンが得られると記されている。しかし、 上記実験結果によれば、プリンタの精細度が同方法の発 明当時平均的に想定された内の最高の精細度である 500 dpiより若干高く 600dpiとなった場合においてそのよ うな青色ノイズパターンを得るには、自由度の大きい25 6×256という大型のマスクを必要としたことになる。 【0083】また、600dpiのプリンタで 256×256の背 色ノイズマスクが実用的であるからと言って1200dpiの プリンタで実用になるという保証はない。実際に、超高 精細レーザープリンタ (Cymbolic Sciences Internatio nal Inc. 製)を用いて実験を行なった。精細度は1016dp iと2032dpiの二種類とした。256×256の青色ノイズマス 2の画面上での大きさは、精細度が1016dpiの場合6.4mm 角、2032dpiでは3.2mm角となる。精細度が1016dpiの実 験では、120階調よりも低い階調では粒状感が強く、160 階調よりも高階調でコントラストは低いがマスクの大き さに対応する周期性が感知された。精細度が2032dpiで は、1016dpiでの実験に比べ粒状感は少ないが、160階調 よりも高階調でコントラストの高いマスクの大きさに対 応する周期性が感知された。このように1200mi程度以 上の高精細度を持つプリンタに対しては、好ましい視覚 特性を得るための青色ノイズマスクの大きさは256×256 よりも大きくする必要がある。

【0084】他方、分散ドットディザ法のマスクサイズ はプリンタの精細度とは基本的に無関係であり、プリン タの精細度が上がる程好ましい視覚特性が得られる。

【0085】次ぎに青色ノイズマスク法固有の問題であるドット分布のムラについて分散ドットディザ法と比較 検討して見た。

【0086】600中iの精細度を持つアリンタを用いた場合、256階調の分散ドットディザ法のマスクサイズは0.6 8mmとなる。階段状のグレースケールを出力した限り、ドットパターンの一様性は、青色ノイズマスク法よりも規則性の高い分散ドットディザ法の方が当然優れている。58万画素程度のCCDセンサーを用いたデジタルカメラで撮影した自然画像を入力画像とした場合、その画面中に出力画面上に換算して0.68mm程度以下のある程度のコントラストを持った周期的パターンが含まれていなければ、モアレも発生せず、青色ノイズマスク法で得た出力画像との画質の違いはほとんど感知されなかった。ただし、グレースケールの場合、50階調目程度までの奇数階調では、マスクサイズとしての0.68mm周期のドットパターンが目につく。

【0087】プリンタの精細度が 1200dpiになると、分散ドットディザ法の視覚的な一様性はさらに向上し、低階調においてもマスクサイズである 0.34m周期のドットパターンは、ドット自体が小さくなることもあいまって目につかなくなる。従ってVGA方式(640画素×480画

索)対応の 1/3インチ35万両素クラス程度のCCDイメージ センサーを用いたディジタルカメラで撮影した画像を、 1200dpiのアリンタを用いて手札判の大きさ(8cm×12.5cm) で出力するような場合であれば、分散ドットディザ 法は十分実用的であると言える。

【0088】なぜなら、この画面上でモアレの原因となる0.34m程度前後の局所的な周期を持つパターンは、センサー面上では17μm程度前後の周期性パターンとなり、センサーの最高分解能である20μm以下なので、入力画像中にその近傍の周期を持つパターンがあったとしても十分なコントラストで分解出来ず、明瞭なモアレとはならない。実際に、イメージセンサーは、補色または原色のカラーフィルターを持ち、像の持つ周期的パターンとのあいだにモアレが生じるのを防ぐため、通常ローパスラィルターを備えているので、分解能はさらに最高分解能の7乃至8割りに低下し、長さに換算すると25~29/m 程度となり、コントラストも低下するからである

【0089】このような場合、分散ドットディザ法のマスクの大きさは青色ノイズマスク法のマスクの大きさに比べ、1/256以下で済むため、コンピューターを介さず、ディジタルカメラに記録した画像を直接プリンタで出力するいわゆるダイレクトプリントシステムでは、マスクの関値を記憶しておく RUMの容量が小さいことはコスト的に有利となる。

【0090】最近、130万画素前後の1/2インチCDイメージセンサーを備えたディジタルカメラが、10万円以下の定価で多くのメーカーより市販されるようになって来た。このようなディジタルカメラの場合、衣服等の細かい縞模様も鮮明に記録される。

【()() 91】従ってそのような入力画像を1200dpi のプリンタと分散ドットディザ法により二値化し手札サイズに出力すると、虚像としてモアレが発生する場合が有り得る。このようなディジタル画像システムでは、マスクサイズが大きく、かつマスク自体が周期性を持たない背色ノイズマスク法は、原理上モアレが発生しないという意味で有利である。ただし、CG画像のように、一般的に言ってあまり細かい周期性パターンを持たない入力画像の場合は、一様性という点では相変わらず分散ドットディザ法が優れていると言えよう。

[0092] 因みに自然画像のみを対象とする限りにおいて、処理時間の問題を除けば、600か1のアリンタで誤差拡散法を用いた場合の画質は、子細に比較すれば、青色ノイズマスク法の画質を若干上回る。しかし、1200か1になると、画質に関する誤差拡散法と青色ノイズマスク法との差はほとんど窓知出来なくなり、処理速度の点で青色ノイズマスク法が優位となる。

【0093】以上説明したように、現時点での最先端の コンシューマー用ディジタル画像処理システムで用いら れる出力装置としてのプリンタの精細度は、骨色ノイズ マスク法が発明された8年前に比べ格段に進歩し、低くて600фiから700фi、高くて1200фi程度と2極分化しつつある。また、当時は存在しなかった入力画像機器としてのディジタルカメラにも精細度に高低二つのクラスが替及しつつある。

【0094】このようにシステムが多様化した状況においては、青色ノイズマスク法が中間調処理法としてすべてのシステムに対して最適な解とはなり得ないことが明確となった。即ち、その差は縮まったものの、600dpi程度の精細度における画質面では依然として誤差拡散法の方が優れ、1200dpi程度になると分散ドットディザ法の方が有効であるシステムが存在する。

【0095】従って現状から今後のシステムを見通し、およそ600dpi以上の特細度を持つ出力装置を前提としたとき、最適な解は、当然のことながら、システムに応じて処理法を使い分けることではなく、分散ドットディザ法の、高速性およびマスクが小型でありながら一様性が良い、という特徴を生かす一方、マスクが小型でかつ周期性を持つことに起因して、虚像が生ずるという欠点を取り除いたマスク法にあることは明らかである。本実施の形態はそのような方法の提供を目的とする。

【0096】このような理想的なマスク法を考案するにあたって考慮すべき重要な要素は、自然画像を入力画像とするときに、記録された自然画像に含まれ得る周期的パターンの特性、即ち、空間周波数とコントラストであり、さらには、中間調処理をされた出力画像を見る目の特性、即ち目の周波数応答性である。既に示したが、1mm前後から数mmの周期的パターンに対する目の感度が高いことを十分に考慮しなければならない。ただし、ここで言う周期的パターンとは、濃淡がサイン関数的に変化し、コントラストが1の場合であることを念頭に置く必要がある。

, 'F

【0097】これらの要素と直接係るシステム側のパラメーターをプリンタを例にとって示すと、これまでの検討結果から明らかなように、次ぎの4点である。

[0098]

- (1) プリンタの画素率(dpi) (2) 出力画像の画面サイズ
- (3) マスクサイズ (4) 階調数

【0099】新規なマスク法の開発に当たって現時点で 考慮すべき上記パラメーターの値の主要範囲は以下の通 りである。

[01()()](1)については、600位i以上 1200位i程度、(2)については、手札版からA4サイズ、(3)は128×128以下(256階調、600位piでの青色ノイズマスクの最適サイズの1/4以下)、(4)は、256以上である。

【0101】(3)のマスクサイズを背色ノイズマスクの 最適サイズの1/4以下とした理由は、ダイレクトプリン トシステムのコストダウンのためである。

【0102】青色ノイズマスク法と分散ドットディザ法

とのドットパターンは、低周波数成分が少ないという共通の特性を別にすれば、前者はランダム性(スペクトル空間で言えば、等方性)、後者は規則性(スペクトル空間で表せば、非等方性)と、全く相反する特性を持っている。

【0103】青色ノイズマスク法に規則性を導入した例 としては、ドットゲインの問題を軽減する目的で、青色 ノイズマスク法の128階調目に分散ドットディザ法の128 階調目と同様のチェッカーボードパターンを用いる方法 がある (M. Yao and K. J. Parker, Proc. SPIE, vol. 2411, pp. 221-225, 1995), ただし、ドットゲインの問 題を軽減するためには、128階調目では、相互に隣り合 った 2×2=4 画素を正方形の1画素としなければならな い。このチェックマスクで生成されるドットパターン は、中央の 128階調目がコントラストの最も高い二次元 周期性パターンとなるため、入力画像にその周期に近い コントラストの高い周期性パターンが含まれていると、 当然虚像としてのモアレが現れることが予測できる。実 際に周期性パターンを持つ被写体を58万画素のヂジタル カメラで撮影し、256×256のチェックマスクで階調処理 し、600dpiのプリンタを用いて出力した手札版サイズの 半分程度の大きさの画像には、はっきりした虚像として のモアレが観測された。このマスクを用いて出力した画 像の画質は本来の青色ノイズマスク法や分散ドットディ ザ法の画質よりも明らかに悪い。

【0104】チェックマスクの128階調目に分散ドット ディザ法の128階調目と全く同じチェッカーボードパタ ーンを用いて同様の実験を行なった。

【0105】細かい周期性を持つモアレチェック用バターンを入力画像としてこのチェックマスクで処理し、60 Odpiのプリンタを用いてキャビネ版の大きさに出力した同様の画像には、コントラストは低いが、やはり虚像としてのモアレが観測された。全体的な画質は、分散ドットディザ法よりは優れているが、本来の青色ノイズマスク法の画質と比べると、モアレが出る可能性が十分あるという意味で当然劣ることになる。

【0106】これら256×256の大きさの二種類のチェックマスクによるドットパターンの非等方性は128階調を挟んでかなりの低、及び高階調まで極めて高い極大値を持つが、そのような場合でも、非等方性の平均値は低く、ほぼ0dBとなる。そこで、これら二種類のチェックマスクに関し、それぞれ大きさについても256×256、128×128、64×64 の3種類を用意し、先に示した階調が階段状に変化するグレースケールを作成した。どのチェックマスクも低階調でのドットの分布の一様性は通常の青色ノイズマスクのそれと同様題かった。また、128×128や、64×64 の大きさのチェックマスクによるグレースケールには、図72 や 図73 同様、マスクの大きさに対応するドットパターンの繰り返しによる虚像が感知された。

【0107】図68に示された青色ノイズ特性の理論体系は、視覚的に好ましい画像を得るには、出来るだけ周期性を排除しなければならないことを示している。従って、上に示したチェックマスクによる実験は、この体系に対し単純に周期性(非等方性)を導入することは、原理上、画質がより劣化することにつながることを実証したことになる。

【0108】規則的な組織的ディザ法に不規則性を導入する試みは、集団ドットディザ法においてなされて来た。 Allebach と Liu (J. Opt. Soc. Am., vol. 66, No. 9,p.909 (1976))はスクリーンによるモアレの発生を防ぐため個々のドット(集団ドットディザ法でのドット集団に相当)の中心位置に擬似周期性を導入した。図82においてドット1個分を含む区面をセルと呼び、セル9個分をブロックと呼ぶ。ここで、正規の位置からずらした上記ドットの中心の位置は、境界を含む各セルの内部に限られるので、不規則性と言っても、ある規則性を持った不規則性である。

【0109】階調数を 256階調とした場合、1階調目と2 55階調のドットパターンが青色ノイズ特性を示すように出来る。ただし、高階調になればなるほどドットの集団が大きくなるという集団ドットディザ法の特性は変わらないので、現状程度の精細度を持ったアリンタには適さない。また、1階調目にせよ青色ノイズ特性を持つマスクを実現するためには、既に青色ノイズマスクに関して示したように、セルの数を多くし、ブロック(マスク)自体を大型にしなければならないので本発明の目的にはそぐわない。

【0110】集団ドットディザ法におけるマスクの規則性に変化を導入した試み (USP 4,752, 822)を以下に示す。図83 に同方法における関値マトリックスの一例を、図84に、同マトリックスによって生成された1階調目のドットパターンを示す。

【0111】この方法では、2種類の変化が見られる。 一つは、図83 に示されたように、奇数階調目の部分 閾値マトリックスと偶数階調目の部分閾値マトリックス を設け、閾値が配置されるべき空間を分割することによ り解像力を40%高め、第2に、同じく図83 に示された ように、部分閾値マトリックスの形を十字型にし、プリ ンタの主走査方向と、マスクが配列される方向とに傾き を与えたことである。実際、1階調目は、図84に見ら れるように、通常の集団ドットディザ法における 1階調 目に比べれば僅かに不規則なドットパターンとなってい る。この方法でも、2階調目以降はドット集団の規則的 な配列が一定の角度傾いて得られる(スクリーンの角度 を傾けたことに相当)ことになるので、解像力を 40%高 めたとは言え、精細度の低いプリンタでは実用的ではな い。ただし、この方法によれば、主走査方向とドットの 配列方向とが平行ではなくなるので、主走査や副走査に 不一様性があった場合、それぞれの走査方向に筋ムラが 生ずるという課題を軽減できる。

【0112】ところで、既に述べたように、通常の集団ドットディザ法と分散ドットディザ法では再現すべき階調数が同じであれば1階調目のドットバターンは全く同じであった。従って、上記の方法で得られた集団ドットディザ法における1階調目のドットパターンを分散ドットディザ法の1階調目とし、さらに当該方法の2階調目以降にも規則性をある程度残したまま弱い不規則性(摂動)を導入し、同方法の持つ各種虚像の発生原因を取り除くといった方法が考えられる。

【0113】なお、誤差拡散法において極めて高い非等方性の値を示す周期性を導入した例がある(USP 5,109.2 82)が、そこに示された一様階調でのドットパターン(Pig.14B及び Fig.15B)にも強い周期性が現れており、簡単な実験でモアレが現れることを証明出来る。チェックマスクの場合と同様、図68 に示された青色ノイズ特性に関する理論体系に周期性、従って非等方性を導入することは、原理上、画質劣化につながることがこの方法でも証明された。

【0114】本実施の形態は、基本的には、分散ドットディザ法のドットパターンの持つ各種の周期性を保存しつつ、そこに弱い不規則性(摂動)を導入したマスク法である。従って、600dpiのプリンタを用いた場合、本方法による一枚のマスクの大きさは、大きくても青色ノイズマスクの最適サイズ256×256の 1/4(128×128)、小さい場合は、1/16(64×64)、実質的には 1/25程度にまで小さくできる。

【0115】さらに、本方法による一枚の小型マスクが 作るドットパターンの非等方性は、各種の周期性を反映 し、脊色ノイズマスク法とは逆に、Ulichneyの示した摂 動誤差拡散法の非等方性よりも高く、比較可能なすべて の階調で全周波数帯域における非等方性の平均値が1.2d B以上で、極大値が4dB以上、好ましくは5dB以上を示 す。これらの値は、先に、マスク法でドットパターンが 例外なく非青色ノイズ特性を持つための条件であること が示された。他の階調においても、同様の非青色ノイズ 特性を持つことが示されるので、本発明のマスクにより 形成されるドットパターンは、すべての階調において非 背色ノイズ特性を持つと言える。マスクの規模を、外形 は同じとし、内部の周期性を高めて記憶容量の意味で実 質的に小さくすると、全階調において、平均値、極大値 とも非等方性が一層増すことになり、顕著な非骨色ノイ ズ特性を持つことになる。従って、出力画面の大きさを 基準となる256×256画素にして評価すると、一枚のマス クが作るドットパターンが 4回以上繰り返されることに なるので、その場合の非等方性は全階調における平均値 そのものが、極めて非等方的とされるべき値としての10 dB程度からそれを十分越える値を示すことになり、Ulic hneyの示した摂動誤差拡散法とは比較にならぬ程高い非 等方性を示す。

【0116】このように、いずれの画面サイズであって も、128×128や、64×64の青色ノイズマスクを用いた場 合よりも高い非等方性を示すにも拘らず、ドット分布の 一様性が高いことと、適度に入った不規則性のため、画 面上でマスクの大きさが数m程度となっても、マスクー 枚分のドットパターンの繰り返しは比較的に目立たず、 モアレが発生することもない。先に示した四つのパラメ ーターの範囲において、既知のマスク法に比べ、視覚的 に最も好ましい中間調を再現できる。

【0117】従って、本実施の形態のマスク法における理論体系(schene)は、これまでの青色ノイズ特性に関する理論体系(図68)と全く異なり、図1に示したように、青色ノイズスペクトルを持たない方が、視覚的に好ましいドットパターンが生成されることになる。言い換えるなら、青色ノイズ特性に関する理論体系においては、視覚的に好ましいドットパターンを得るために出来るだけ排除すべき周期性(非等方性)を、本実施の形は、の理論体系では、逆に、特に非等方的とされる程度にまで取り入れることにより、小型のマスクでありながら、大型の青色ノイズマスクが生成するドットパターンが得られることになる。さらに補足するなら、このような好ましい視覚特性は、出力装置の精趣度が上がる程、容易に得られることになる。

【0118】本実施の形態におけるマスクは四つの基本 的規則性を持つ。これらの規則性は、分散ドットディザ 法のマスクや、分散ドットディザ法が持つ規則性を受け 継いだものである。マスクの持つ規則性とそれによって 生成されるドットパターンの規則性は 1対1 に対応して いる。従って、分かりやすいように、再現すべき階調数 を 256階調とし、実空間におけるドットパターンの持つ 四つの規則性を以下に列挙する。なお、256階調の分散 ドットディザ法のマスクの大きさは 16×16であり、本 方法のマスクはその整数倍の大きさを持つ。本実施の形 態においては、この 16×16 の大きさのマスクを要素マ スク、その整数倍の大きさのマスクを単位マスクと呼 ぶ。画素空間では、要素マスクに要素画素区画が、単位 マスクに単位画素区画が対応する。なお、要素画素区画 を四等分した大きさの区画を部分要素画素区画と定義す ъ.

【0119】以上の用語を用いると、四つの規則性は以下のように表現される。(1) 16×16の要素画案区画内のドットの分布が全階調で全く同じとなる要素画素区画の組を持つ。(2) 1 階調目のドットパターンは 分散ドットディザ法と同一とする。(3)すべての階調で16×16の各要業画業区画内のドットの数を同数とする。(4) 4 n 階調毎に 8×8の各部分要素画素区画内のドットの数を同数とする。

【0120】上記四つの規則性とそれらがもたらす作用

について図2を用いて説明する。

【0121】図2は、分散ドットディザ法の1階調目のドットパターンの一部を示す(図69の一部に同じ)。同図において、各16×16の西素区画は、分散ドットディザ法における16×16の大きさのマスクー枚分が生成するドットパターンの大きさに相当し、黒く塗られた画素が1階調目に打たれたドットである。本実施の形態の方法においても、基本的には規則性(2)に従い、1階調目のドットパターンは図2に一致させる。

【0122】規則性(2)の作用は、以下の通りである。 自然画像においては、コントラストの高い精模様は、人 工物としての衣服の模様、織り目、編み目や、建造物の 壁面、格子などにおいてよく見られる。これに対し、コ ントラストの非常に低い精模様は、それが規則的であれ ばあるほど自然界に存在する割合が少なくなる。さら に、ビデオカメラやディジタルカメラで撮影する画像に おいては、撮像素子のダイナミックレンジが狭いため、 コントラストの非常に低い精模様は殆ど記録されない。 また、コントラストの非常に低い精模様は、もともと目 、に不快なパターンとして認識されることはない。

【0123】さらに、600中iのプリンタを用いた場合でさえも、1階調目のドットパターンは、ドットからドットまでの周期としては確かに 0.68mm と目で分解出来る距離にはあるが、白黒同じ幅を持つ線状パターンと異なり、黒いドット自体は直径約40μm(0.04mm)と、ドット間隔に比べ非常に小さいので、周期性パターンとしては感知し難い。従って、入力画像にこのような低い階調で類似周期を持った線状パターンがあっても、出力画像の基本は、1階調目のドットパターンであるので、目に不快な程のコントラストを持ったモアレ(虚像)が生じる恐れは全くない。

【0124】他方、一様で低階調な出力画像では、ドットパターンの一様性は、すでに図69に分散ドットディザ法の1階調目を示したように、規則的な方が、図70に示した青色ノイズマスク法の1階調目のランダムなドットパターンよりも圧倒的に良い。本規則性は、(1)、(3)、(4)の規則性と相まって、入力画像の低階調領域におけるなだらかな階調の変化の再現性を高めることに寄与する。また、20階調目程度までの各低階調におけるドットパターンの一次元周波数特性は、1階調目に打たれたこの規則的パターンによる孤立スペクトルを有し、高い非等方性を持つ。言い換えるなら、規則性(2)は、低階調におけるドットパターンの一様性を高めると同時にマスク自体に周期性、従って非等方性を導入する作用を有する。

【0125】図2 において、太い線によって区切られた16×16画素が、分散ドットディザ法のマスク1枚分によって生成されるドットパターンが占める画素区画であり、画面上では同じドットパターンが 16画素を 1周期として縦方向と横方向とに整然と周期的に並ぶことにな

る。上記規則性(1)で言う要素画素区画とは、この16×16の大きさの画素区画を指す。すてに述べたように、本実施の形態のマスクは、この 16×16の大きさの要素マスクを整数個並べた大きさを持つ、従って、本実施の形態の方法は、規則性(3)により、2階調目以降に打たれる各ドットの位置は異なるにしろ、16×16 の各要素画素区画内に打たれるドットの数はすべての階調において、分散ドットディザ法と同一になる。なお、本実施の形態において要素マスクを整数個並べたマスクを単位マスクと呼ぶが、その形状は正方形に限らない。

【0126】分散ドットディザ法の 3階調目のドットパターンの一部を図3 に、4階調目のドットパターンの一部を図4 に示す。

【0127】これら二つの図において、点線で区切られた各8×8の画案を有する区画が規則性の(4)における部分要素画素区画を指す。図4に示したように、分散ドットディザ法においては、1階調目には、左上の部分要素画素区画内の画素1にドットを打ち、2階調目には右下の部分要素画素区画内の画素2にドットを打ち、3階調目には右上の部分要素画素区画内の画素3にドットを打ち、4階調目には左下の部分要素画素区画内の画素4にドットを打ち、5階調目には、再び左上の部分要素画素区画内の画素4にドットを打ち、5階調目には、再び左上の部分要素画素区画内の画素4にドットを打つ販番が4階調合を1周期として予め決められている。

【0128】従って、分散ドットディザ法においては、nを整数として、4n階調毎に8×8の各部分要素画素区画内に打たれたドットの数が同一となる。このように、2階調目以降に打たれるドットの各位置は分散ドットディザ法とは異なるが、打たれるドットの数に関する本実施の形態の規則性(4)は、分散ドットディザ法が持つ規則性と同一である。

【0129】これら規則性(3)、(4)の作用は、分散ドットディザ法がそうであるように、明らかに、ドット分布の一様性を高めることである。後に説明するが、本実施の形態における各ドットの位置を決めるためのアルゴリズムは、各ドット間の距離を階調に応じた所定の値に近付ける作用(ドット分布の一様性を高める作用)を持つ。これら二つの規則性は、その作用と相まって、強力に一様性を高める働きをする。

【0130】規則性(1)とその作用を図4 を用いて説明する。本実施の形態の単位マスクが16×16の大きさの要素画素区両を例えば 4×4=16 個、正方形に並べた大きさを持つとする。図4がそのようなマスクー枚分によって得られるドットパターンの一部を示すものとしたとき、図4 において、チェッカーボード状にグレーで表した要素画案区画 5、6、7 を全く同じパターンとすることが規則性(1)である。分散ドットディザ法のドットパターンはもともと図4 に示したように一つの要素画素区画のドットパターンを縦模整然と並べて得られるの

で、各要素画素区画すべて同一であったから、この規則性(1)も、ある 16×16の画素区画の中のドットパターンと全く同じドットパターンが他の要素画素区画にも繰り返し現れるという意味で分散ドットディザ法のドットパターンの持つ規則性に…致する。

【0131】また、この規則性(1)を、マスク自体が持つ周期性と見れば、2階割目以降、分散ドットディザ法の各ドットの配置自体、マスク内で周期性を持つので、分散ドットディザ法のマスクが持つ規則性とも一致する、

【0132】従って、この規則性(1)には二つの作用がある。マスクの大きさを仮に 64×64としたので関値マトリックスの要素が4096個ある。しかし、関値の配列を全く同じにした要素マスク 8個については、読み出し方を工夫すれば、一個分の関値マトリックスがあれば済むので、マトリックスの要素は (16×16)×9=2304個 となり、必要なメモリ容量が半分強で済むという作用をもたらす。

【0133】小型マスクの大きさよりもさらに小さいスケールを持った周期性を局所的な周期性と呼ぶならば、この規則性(1)はそのような局所的な周期性を導入する作用もあることはすでに述べた。即ち、この規則性は、規則性(1)と同様、マスク自体に非等方性を導入する作用もある。従って、限度はあるが一般的に言えば、閾値の配列を全く同じにした要案マスクの組を多く持てば持つ程、即ち、マスクのためのメモリ容量を減らせば減らす程、マスクー枚で生成されるドットパターンの非等方性が強くなるという結果がもたらされる。

【0134】 本マスク作成のためのアルゴリズムに関するフローチャートの機略を図5 に示す。図5において、ステップ S1 から S3 までは、これまでの説明により、各規則性との関係が明らかにされた。即ち、ステップS1で規則性の(1)、ステップS3で規則性(2)が導入された。

【0135】次ぎに2 階調目のドットバターンに弱い不規則性(摂動)を導入するステップS4について、その一例を図6 によって説明する。

【0136】図6 は16×16の要素マスクを 4×4=16個並べた単位マスクにより生成した 2階調目のドットパターンの一部を示す。16×16画素を持つ個々の要素画素区画 5~10の内、グレーで塗った 5、6、7 の各要素画素区画に対応する要素マスクは、図5、ステップS1により、1~255までの全関値の配列が全く同じになるよう予め決められている。残りの要素画素区画 8、9、10 の2階調目以降は、相互に独立したドットパターンとなる。

【0137】図6 において、例えば要素画素区画5 の各画素の横の並びを行、縦の並びを列として、各画素の位置を (i, j)で表した時、(4, 4)の画素に打たれたドット1は図5 の ステップS3 の段階で打たれた1階調目

のドットであり、従ってすべての要素画素区画の(4, 4) の画案にドットが打たれている。このドットパターン は、組織的ディザ法の1階調目のドットパターンに一致 する。

【0138】図5のステップ S4 において、1階調目の 周期的ドットパターンに 2階調目で加えられる擬似周期 的パターンについて説明する。

【0139】図6の要素画素区画 5において、(12, 12)の画素に打たれたドット 2が 2階調目に打たれたドットである。従って同じ関値配列を持った16×16の大きさの要素マスクに対応する他の要素画素区画 6、7 の(12, 12)の画素にもドットが打たれている。因みに、これらのドットによるパターンは、分散ドットディザ法の 2階調日に打たれるドットパターンに含まれている。

【0140】それぞれが異なる関値配列を持った要素マスクに対応する要素画素区画 8、9、10 に 2階調目で打たれるドット位置は以下のようにして決められる。

-47

【0141】それぞれの要素画素区画の中に、(12, 12) の画素を中心とする7×7=49 の画素からなる小画素区画 11~13 を設ける。先に各要素画素区画内の1階調目の ドット位置を(1. 1)画素から(4. 4)画素へと移動させて おいた訳は、これらの小画案区画を各要案画業区画内の 右下の 8×8画素の大きさを持った部分要素画素区画内 に納めるためであった。次ぎに、それぞれの小画素区画 の中からランダムに 1面素を選びそこにドットを打つ。 【0142】以上のように、2階調目で打たれるドット は、分散ドットディザ法の2階調目のドットパターンに 弱い不規則性(摂動)を加えたパターンとなる。 またこの ドットパターンは、1階調目のドットパターンと同じ基 本周期を持っているので、擬似周期性パターンである。 この過程S4で、小画素区画 11~13 の大きさを 5×5=25 画素 とか、3×3=9画素 とかより小さくすることによ り、導入する不規則性の程度をより小さくできる。従っ て、3階調目以降の各階調におけるドットバターンの骨 格は、基本的には、2階調目までに導入するこの弱い不 規則性によって決定付けられる。このようにして導入さ れる弱い不規則性は、3階調目以降のドットバターンを 生成する本実施の形態のアルゴリズムと相まって、分散 ドットディザ法が持っていた周期的な虚像が現れ易いと いう欠点を殆ど取り除くという作用をもたらす。

【0143】図5において、3階調目以降のドットパターンを生成するステップ S5 について図7、8、9を用いて説明する。

【0144】 3階調目以降、各階調毎に新たに打つドットの位置を決めるアルゴリズムは、3階調目のドットパターンを決めるアルゴリズム、即ち、2階調目までにドットが打たれている画素すべてに一定の形状を持った図7に示す斥力ポテンシャル P(r) を付与し、16×16の各要素画素区画の内部でそのポテンシャルが最小になる1 画素を新たなドットを打つ画素と決めるというアルゴリ

ズムと基本的に同様である。

【0145】ここで、規則性の(1)に従う要素画素区画は、例えば先ず要素画素区画5 についてドットを打つ画素が決まれば、要素画素区画6、7 については、一々ポテンシャルの計算をすることなく、自動的に要素画素区画5 で打つことが決まった画素と同じ位置の画素にドットを打つことにする。

【0146】2階調目までは、図6 に示したように、16 ×16の各要素画素区画内に打たれたドット数は 2個で、 規則性の(3)を満たしていたから、以上に示したような 各階調で新たに打つドットの位置を決めるアルゴリズム に従えば、3階調目以降のすべての階調でこの規則性が 満たされることになる。

【0147】斥力ポテンシャルは、固体物理学で使われるポテンシャルである(C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 6th ed. (John Wiley &; Sons, 1986): 邦訳、固体物理学入門(上)第6版、字野良清他(丸・善、1988) p. 68)。その関数形は、入、ρをパラメーターとし、r をポテンシャルの中心からの距離としたとき P(r)=入 c エノク

で与えられる。3次元と2次元の違いはあるが、本実施の 形態で用いられる斥力ポテンシャルを次式で定義する。 【0148】

$$P(r) = e^{-\alpha r}$$
 (2)

ただし、階調数を g として

[0149]

[外2]

$$\alpha = \frac{\beta}{\sqrt{256/g}} \tag{3}$$

とする。ここで、

[0150]

【外3】

√256/g

は各階調 8において、ドットが一様に分布しているとしたとき、ドット間の平均距離が比例すべき長さ(距離)に相当する。この場合、階調数が大きくなる程ドットの密度が上がり、αが大きくなるので、斥力ポテンシャルは r に関し急速に減衰する関数となる。斥力ポテンシャルの階調数依存性をなくす場合には、(3)式において機械的に、g = 256 とすれば良い。

【0151】図7 において、画面上、ボテンシャルを 付与する画素の位置を原点としたときの直交座優系の模 軸を x 軸、縦軸を y 軸とする。rmax は、そこから先 のボテンシャルを零とする原点からの距離である。距離 の単位は、隣り合った画素間の距離、即ち、画案の一辺 の長さ s である。

【0152】階調数依存性を持つ斥力ポテンシャルの一例を図8 に示す。このポテンシャルでは β = 0.4、rm x=128(s) とした。同図からわかるように、階調数が大きくなり、ドットの密度が上がるに連れ、斥力ポテンシ

ャルは急速に減衰する。

【0153】このような斥力ポテンシャルを用い 3階調 日以降のドットパターンを作成する方法を図9 を用い て説明する。

【0154】図9 において、簡単のため単位マスクは小規模で 32×32の大きさを持つとすると、画案空間では、16×16画素の大きさの四つの要素画素区画、14、15、16、17 からなる 32×32画素の大きさの単位画素区画18がそれに対応していることになる。ここで、要素画素区画14と17は、規則性(1)に従い全階調で全く同じドットパターンを持つ要素画素区画の組とする。さらに、単位マスクの配列の仕方は、画素空間では、単位画素区画18を x 方向と y方向のそれぞれの方向に密に敷きつめた配列に対応しているとする。

【0155】単位画素区画18 において、それぞれの要素画素区画内には、規則性(2)に従う1階調目のドット23、24、25、26と 2階調目の4個のドットとが既に打たれている。

【0156】この段階で、個々の要素画素区画の中の四つの8×8の部分要素画素区画の中でドットが打たれた二つの部分要素画素区画を記憶しておき、4階調目のドットパターンが完成するまでそれらの部分要素画素区画には新たなドットを打たないようにする。この規制は、規則性(4)を実現するために設ける。

【0157】斥力ポテンシャルが値を持つ最大半径 rma x は、簡単のため、画素間距離をsとして13s であるとする。この斥力ポテンシャルを要素画素区画15 内に打たれた1階割目のドット23 に付与する仕方を説明する。【0158】このポテンシャルが単位画素区画14 の左側の境界から外部にはみ出し、外縁を一点鎖線28 で表したポテンシャルの部分については、そのままの形で右側の境界の内部に平行移動する。ポテンシャルのこの部分は、単位画素区画18 の右隣に位置する単位画素区画14 内の1階調目のドット25 に対応する同じく1階調目のドット31に付与した斥力ポテンシャルが、単位画素区画18 の内部に及ばすポテンシャルが、単位画素区画18 の内部に及ばすポテンシャルが、単位画素区画18 の内部に及ばすポテンシャル52に等しい。

【0159】単位画素区画18の上側の境界から外部にはみ出し、破線で表したボテンシャルの部分29については、そのままの形で下側の境界の内部に平行移動する。ボテンシャルのこの部分は、単位画素区画18の下隣の単位画素区画中、単位画素区画18の1階調目のドット23に対応する同じく 1階調目のドット33に付与した斥力ボテンシャルが、単位画素区画18の内部に及ぼすボテンシャル34に等しい。

【0160】単位画業区画 18 の左斜め上の単位画素区 両にはみ出し、点線で表したボテンシャルの部分30につ いては、そのままの形で右下隅に平行移動する。ボテン シャルのこの部分は、単位画素区画18 の右斜め下の単 位画素区画中、単位画素区画18 の 1階調目のドット23 に対応する同じく1階調目のドット35に付与した斥力ポテンシャルが、単位画案区画18 の内部に及ぼすポテンシャル36に等しい。

【0161】同様の方法で、単位画衆区画18 の内部に 打たれたすべてのドットに斥力ポテンシャルを付与し終 えたとすると、単位画素区画18 の内部にそれらすべて の斥力ポテンシャルを足し合わせたポテンシャルの分布 が出来る。

【0162】次ぎに、単位画衆区画18 の内部で、先に足し合わせた斥力ポテンシャルが最小になる画案37に3 階調目のドットを打つ。同時に要楽画衆区画17 の内部で、画案37に対応する位置にある画案38に3階調目のドットを打ち、それらの画業37 と38とに斥力ポテンシャルを付与し、すでにあるポテンシャルの分布に重ねあわせる。この段階でドットが打たれた要素画素区画とそれに属する部分要素画素区画が記憶され、それぞれ 4階調目のドットが打ち終わるまで新たなドットを打たないように規制して規則性(3)と(4)を実現する。

【0163】以上で得られた斥力ボテンシャルの分布に 関して、3階調日のドットが打たれずに残された要素画 案区画15と16の内部で、その値が最小になる画素に3階 調目のドットが打たれ、そこに斥力ボテンシャルが付与 され、新たなボテンシャルの分布が出来る。この段階 で、ドットが打たれた要素画素区画とそれに属する部分 要素画素区画が記憶され、それぞれ 4階調目のドットが 打ち終わるまで新たなドットを打たないように規制して 規則性(3)と(4)を実現する。

【0164】以上の段階で、3階調目のドットが打たれていない要素画素区画は1区画のみとなり、その内部で、斥力ポテンシャルの値が最小となる画素に自動的に3階調目の最後のドットが打たれ、そこに斥力ポテンシャルが付与され、新たなポテンシャルの分布が出来る。この段階で、ドットが打たれた部分要素画素区画が記憶され、4階調目のドットが打ち終わるまでその区画に新たなドットを打たないように規制して規則性(4)を実現する。

【0165】4階調目のドットパターンは以下のように して作成する。

【0166】3階調目のドットパターンが完成した段階で四つの要素両素区画 14、15、16、17 のそれぞれは、ドットがまだ打たれていない部分要素画素区画を一つだけ持っている。従って、それら四つの部分要素画素区画の内部で 3階調目の斥力ポテンシャルの分布が最小となる画素に体階調目の最初のドットを打つと同時に、その画素に斥力ポテンシャルを付与し、新たなポテンシャルの分布を作る。この段階では、ドットを打った部分要素画素区画を記憶しておき、4階調目のドットパターンが完成するまではそこに新たなドットが打たれないよう規制し、規則性(4)を実現する。

【0167】もし、ドットを打たれた部分要衆画素区画が、規則性(1)を満たす要衆画案区画の租の一方に属するなら、他方の要衆画衆区画内でドットを打つ画衆も同時に決まり、それに応じた新たなボテンシャルの分布と、新たなドットを打つことが規制される部分要素画素区画が決まる。

【0168】同様の過程を繰り返し、四つの要素画素区 画すべてに一個ずつドットを打ち終えることにより 4階 調目のドットパターンと斥力ポテンシャルの分布とが決 まる。

【0169】4階調目以降のドットパターンの作成法を 説明する。nを正の整数とし、4n階調目の単位画素区画 内での斥力ポテンシャルの分布を既知として、4n+1階調 目のドットパターンの作成から始める。

【0170】単位画案区画内で「nP問調目までの斥力ボテンシャルの分布の値が最小となる画素にドットを打つと同時に斥力ボテンシャルを付与し、新たなボテンシャルの分布を作る。さらに、その画素を含む要素画素区画と部分要素画素区画とを記憶し、その要衆画素区画には 4 n+1階調目のドットパターンが完成するまで新たなドットを打たないよう規制し、その部分要素画素区画には 4 (n+1)階調目のドットパターンが完成するまで新たなドットを打たないよう規制し、規則性(3)と(4)に従う。

【0171】もし、ドットを打たれた要素画素区画が、規則性(1)を満たす要素画素区画の組の一方に属するなら、他方の要素画素区画内でドットを打つ画素も同時に決まり、それに応じた新たなボテンシャルの分布と、規則性(3)と(4)に従うため 4n+1階調目のドットバターンが完成するまで新たなドットを打つことが規制される要素画素区画と、4(n+1)階調目のドットバターンが完成するまで新たなドットを打つことが規制される部分要素画素区画とが決まる。

【0172】上記の新たなポテンシャルの分布の下で、ドットを打つことが許される要素画素区画と部分要素画素区画の内部で、ポテンシャルの値が最小となる画素にドットを打つと同時に斥力ポテンシャルを付与し、新たなポテンシャルの分布を作る。さらに、その画素を含む要素画素区画と部分要素画素区画とを記憶し、その要素画素区画には 4n+1階調目のドットパターンが完成するまで新たなドットを打つことを規制し、その部分要素画素区画には 4(n+1)階調目のドットパターンが完成するまで新たなドットを打たないよう規制し、規則性(3)と(4)とに従う。

【0173】同様の過程を繰り返し、四つの要素画素区 画すべてに一個すつ新たなドットを打ち終えることによ り 4n+1階調目のドットパターンと斥力ポテンシャルの 分布とが決まる。

【0174】以上、4n階調目のドットパターンから 4n+1階調目のドットパターンを完成するまでと同様の過程により、4n+2階調目、4n+3階調目および 4(n+1)階調目

のドットパターンと斥力ポテンシャルの分布とが決ま る。

【0175】このようにして255階調目までの全階調のドットパターンが決まるので、図5のステップS7に移行してマスクの全間値を決めることが出来る。

【0176】本方法では、ドットバターンは1階調目から順に作られ、従って、下の階調でドットが打ってある画素には、より上の階調でもその画素には必ずドットが存在した。各階調でのドットバターンを作成するこの過程では、一様階調の入力画像の階調数を n (nmax= 256)、関値マトリックスの各要素の値を m (mは正の整数で、mnax =255) として、上記各階調でドットを打った画素に対応する関値マトリックス上の要素の値を 1 から一つずつ上げてゆき、

$$m = \bar{n}$$
 (4)

を満たした時にドットを打ったことになる。このように して各要素の値を決めてゆけば全関値が決まりマスクが 完成する。

【0177】一般の入力画像では、このマスクを用いて 画素の階調数と対応する閾値とが

を満たすときにドットを打つことにすれば良い。

【0178】このように、本実施の形態の方法では、斥力ボテンシャルと規則性の(1)、(2)、(3)および(4)とを適用して各階調毎にドットパターンの最適化が計られるので、1階調目から 255階調目まで、すべての階調において一様性の極めて良いドットパターンが得られる。実際、後に示す全実施の形態において確かめた(不図示)ことであるが、階調数が大きくなるに連れて打たれたドットの数が多くなると、一次元のスペクトルにおいてノイズ成分の高周波数領域に高いピークを持った孤立スペクトルが現れるようになる。最適化により一定のドット間距離を持つドットの粗を形成するドットの数が、そうでないドットの数に比べ相対的に多くなるからである。

【0179】本方法のこのような特徴は、中央の 128階 調目で最適化するため、階調数が下がれば下がる程、また上がれば上がる程、ドット分布の一様性が悪くなる背色ノイズマスク法とは際立った違いを示す。

【0180】以上、図5 と図8 について説明したマスクの作成法を基本とするが、規則性の(1)から(4)を保ったまま、マスクの作成法を種々変更することは可能である

【0181】例えば、上に示した方法では、n階調目のドットパターンから n+1階調目のドットパターンを作成する際、斥力ボテンシャルの分布に基づき新たなドットを打つ画素を決めると同時にその画素に斥力ボテンシャルを付与し、かつ、ボテンシャルの分布を更新するという手続きを踏んだ。

【0182】この手続きを簡略化し、n階調目のドット パターンから n+1階調目のドットパターンを作成する 際、n階調目の斥力ポテンシャルの分布に基づき、四つの要素画素区画それぞれの内部においてポテンシャルの分布が最小値を示す画素に新たなドットを打つことにより、一度に n+1階調目のドットパターンと斥力ポテンシャルの分布とを作成するようにしても良い。この方法では、高階調になる程、本来の方法とのドットパターンの違いは少なくなり、ドットパターンの一次元空間周波数特性や非等方性に基本的な変化はない。

【0183】規則性の(2)のみを若干変更することも可能である。図9 においては、規則性の(2)に従い、1階調目のドットパターンを、分散ドットディザ法の 1階調目のドットパターンと同じにした。このドットパターンに弱い不規則性(摂動)を加えて1階調目を擬似周期的なドットパターンとすることが出来る。そのようなドットパターンの一例を図10に示す。

【0184】図10 において、単位マスクは32×32の 大きさを持ち、画素空間では、16×16画素の大きさの四 つの要素画素区画 14、15、16、17 からなる 32×32画 素の大きさの単位画素区画18に対応しているとする。ここで、要素画素区画14と17は、規則性(1)に従い全階調で全く同じドットバターンを持つ要素画素区画の組とする。

【0185】1階調目のドットパターンを作るために、 先ず各要素画素区画の中の右上の部分要素画素区画の中 央に 4×4の小画素区画 39、40、41、42を設定する。次 ぎに、各小画素区画の 16画素の中からランダムに 1画 素を選び出し、そこに 1階調目のドットを打つことにして 1階調目のドットパターンを作成する。ただし、小画 素区画 39と 40 の中でドットが打たれる画素の位置は 同じである。この方法においても、小画素区画の大きさ により、不規則性の程度を制御できる。

【0186】この方法では 1階調目以降のドットパターンの作成の仕方に大きく分けて二つある。

【0187】一つは、図11 に示したように、図5 に 示したフローのステップ S4 に従い、第2階調目でも擬 似周期性バターンを加え、3階調目以降は ステップS5以下のフローに従う方法である。他の一つは、図12 の ように、第 2階調目以降からS5以下のフローに従う方法 である。いずれの方法でも図5 に示した方法に比べ、 低階調において非等方性が若干減るということはあるに しろ、ドットバターンの一次元空間周波数特性や非等方性が基本的に変化するということはない。

【0188】また、プリンタの精細度が1200dpi と一層高い場合には、分散ドットディザ法におけるドット分布の一様性の良さを生かす意味で、上記変更とは逆に、摂動を導入する階調をより上の、例えば、5階調目にするという変更も可能である。

【0189】以上詳しく説明した通り、既存のディザ法の持つ課題を、弱い不規則性(摂動)を導入すると言う手段を別にすれば、分散ドットディザ法の持つ基本的な四



つの規則性をそのまま用いるという手段で解決したため、それらの規則性が分散ドットディザ法で機能したように、高い非等方性をもたらすという作用と同時に、比較的小型のマスクでありながら出力装置の精細度が上がる程視覚的に好ましいドットパターンが生成出来る、という作用をももたらした。

【0190】出力装置の精細度の大幅な向上が、青色ノイズマスク法にはより大きなマスクを要するようになると言う意味で不利な方向に働くことと照らし合わせると、そのような新たな技術環境下において、非等方性に関しては青色ノイズの理論体系(図68)とはまさに正反対の理論体系(図1)に従うマスク法の優位性は明らかである。以下実施の形態を詳細に説明し、その優位性を実証する。

【0191】以下、添付図面に従って、本発明の実施の 形態を詳細に説明する。実施の形態は、すべて図5の基本的なフローに従って作成したマスクに関わる。

【0192】図13 は、本実施の形態において画像を 処理するための基本的システムを示す。

【0193】同図において、100 は入力画像101 を走査する例えばスキャナ等の画像入力装置である。この装置では、連続階調を持った入力画像101 に対し、階調数を例えば256階調にディジタル化したり、非線形処理を施したり、カラー入力画像の場合は色の各成分に対し色処理をするなどの前処理102 がなされる。103 は階調処理装置であり、本実施の形態で特徴的な各種の周期性、即ち強い非等方性と弱い不規則性(摂動)とを兼ね備えた関値マトリックス(マスク)105 を記憶するメモリ104 と、入力画像の各画素の階調数と、対応する関値とを前記(5)式に基づいて比較し、その結果に応じて出力値として 0 (ドットを打たない)か 1 (ドットを打つ) かを決定する比較器106 とを含む。107は、比較器106 からの出力値に基づいて形成した出力画像108 を表示や印刷等の形態で出力する装置である。

【0194】また、ディジタルカメラを入力装置とするダイレクトプリントシステムでは、図13 において、入力画像の持つ輝度情報、色情報などはデジタル情報に変換されてカメラ側のメモリに蓄えられる。従って、前処理102 の一部として、プリンタの特性を考慮した非線形処理や色処理などと、階調処理装置103 とは、出力装置としてのインクジェットプリンタ107 に組み込まれることになる。

【0195】(第1の実施の形態) 本実施の形態の特徴を持つマスクの一つを作成する手順について図5 のフローチャートに従って説明する。

【0196】図14 は本実施の形態における単位マスクに対応する単位画素区画の形状、大きさ、および同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す。同図によって、マスクは128×128 の大きさの正方マトリックスであることがわかる。また、黒く塗りつぶされた 16×16

画素の要素画案区画はすべて全階調で同じドットパターンとなる、従ってそれらに対応する16×16の要素マスクはすべて同じ関値配列を持っている。

【0197】図15 に、図5のステップS2 に基づき、出力画面上で単位マスクに対応する128×128画素の単位画案区画が二次元的に配列される様子を示す。出力装置がプリンタである場合、右向きの矢印はインクを吐出するヘッドやレーザービームなどに関する主走査方向を表し、下向きの矢印は祇送り等の副走査方向を示し、矢印に沿えた番号は、画面上でマスクが走査される順番を示す

【0198】本実施の形態における図5 のステップ53 と S4 とを図16 により説明する。同図において、16 ×16の各要素画素区画の(4, 4)画素に打ってあるドットが分散ドットディザ法の1階調目と同一のドットバターンである。

【0199】グレーに塗りつぶされた要素画素区画はすべて同じドットパターンを形成するが、これら各要素画素区画の(12, 12)画素に打ってあるドットは 2階調目のドットであり、これらも分散ドットディザ法の 2階調目のドットの位置に一致する。それ以外の要素画素区画内には 7×7の小画素区画が設けてあり、この 49画素の中からランダムに 1画素を選択し 2階調目のドットとした。従って、2階調目に打たれたドットは、分散ドットディザ法の 1階調目のドットパターンと同一周期を持つ 擬似周期性パターンとなる。

【0200】3階調目以降については、すでに詳しく説明したように、図5のステップ55に従い(2)、(3)式及び図8で示された斥力ボテンシャルを用いてドットバターンを形成した。ただし、70階調目までは階調毎にボテンシャルを変化させたが、71階調目以降は、70階調目で用いたボテンシャルに固定した。

【0201】このようにして作成したマスクを用いて、一様な濃度を持った入力画像について600かiの BJプリンタにより 256×256画素の画面サイズにドットパターンを出力した。8階調目のドットパターンを図17に、32階調目のドットパターンを 図18に示す。これらの図は、600かiの BJプリンタにより得られた上記実画面を縦横10倍の大きさに拡大して出力した。単位マスクに対応する単位画素区画はこれら画面のちょうど 1/4 の大きさであり、図17、18 に示されたドットの分布から、単位マスク自体の持つ周期性を読み取ることが出来る。

【0202】図19、20 に、本実施の形態による単位マスクー枚によって生成した 32階調目における128×128画素の大きさのドットパターンに関する空間周波数特性を示す。図19 は半径方向の一次元周波数特性を示すが、ノイズ成分の上に鋭いピークを持った孤立的スペクトルが多数乗っている。

【0203】図20 は非等方性を示す。平均値は3dB強

を示し、極大値は、それを越えると特に非等方的であるとされる4dBを大幅に越え、中には極めて非等方的なレベルである10dB近傍か、それを越えるスペクトルが存在する。両方の値共、誤差拡散法においても非青色ノイズ特性と判定できるレベルにある。従って、このマスク1校分のドットバターンが非青色ノイズ特性を持つことは明らかである。高い非等方性を示す周波数と一次元周波数特性における孤立的スペクトルの周波数とが一致する場合はそのスペクトルがマスク自体の周期性に起因するスペクトルであることを示す。

【0204】以上のようなスペクトル特性は 32階調目 に限らず他のすべての階調において見られるので、本実 施の形態の単位マスクは明らかに非青色ノイズ特性を持 つ。

【0205】図21、22 に、本実施の形態による128×128の大きさの単位マスクによって、スペクトルを評価する際の基準となる256×256面素の画面サイズに生成した32階調目のドットパターンに関する空間周波数特性を示す。

【0206】図21 は半径方向の一次元周波数特性を示すが、実線は本実施の形態、破線は 256×256の大きさの青色ノイズマスクを用いた場合を示す。単位マスクー枚分のみの場合に比ベノイズ成分が減少し、高く鋭いビークを持った孤立的スペクトルの本数が増大し、青色ノイズマスクのスペクトルと際立った違いが見られる。【0207】図22 は非等方性を示す。実線は本実施の形態、破線は 256×256の大きさの青色ノイズマスクを用いた場合を示す。本実施の形態の場合には、平均値自体 10dB程度の極めて強い非等方性を示し、平均値が0億と等方的な青色ノイズマスク法との違いは明白である。

【0208】 図77に示したように、128×128の大きさの青色ノイズマスクの場合、256×256画素の画面サイズに生成したドットパターンに関する非等方性は、平均値自体が8dB程度となり青色ノイズ特性を示さなかった。その場合、図72のグレースケール上には128×128画素の大きさのムラが周期的に並ぶ様子が虚像として感知され、実用的ではなかった。ところが本実施の形態では、それよりなお強い非等方性を示すにも拘らず、そのようなムラは感知されなかった。

【0209】また、例えば人体の表面のように、低い階調で陰影がなだらかに変化する入力画像を本実施の形態のマスクと256×256の大きさの青色ノイズマスクとを用いて処理した出力画像を比較すると、なだらかな陰影の再現性は若干木実施の形態のマスクを用いた場合の方が上回った。このような木実施の形態の場合のドット分布に関する一様性の良さは数値的にも裏づけられる。16×16 世界の大きさの画素区画を画面上で走査し、その区画に含まれるドットの数のバラツキを調べたところ、規則性の(2)や(3)に従う本実施の形態の方が大部分の階調で

少ない値を示した。

【0210】しかも、このように視覚的に好ましいドットパターンを発生するマスクの大きさは、この精細度のプリンタで最適な大きさを持つ青色ノイズマスクの大きさの1/4 で済むことになる。さらに、図14 で黒く塗られた16個の要素面素区画に対応する要素マスクは皆同じ関値配列を持っているので、1個の要素マスクを記憶するだけで済み、マスク用の実質的な記憶容量は 1/5となる。

【0211】以上の評価結果は、本実施の形態のマスクが、図68に示した青色ノイズ特性に関する理論体系(scheme)にではなく、図1に示した新たな理論体系に基づいていることを示している。即ち、始めから小型のマスクが繰り返し周期的に使用されることを前提に、言い換えるなら、空間周波数特性が強い非等方性を示す前提の下で、図68の理論体系とは逆に、マスク自体を小型にし、かつ(1)から(4)に示した各種の規則性や周期性、即ち強い非等方性、を付与することによっても周期的な虚像のない視覚的に好ましいドットパターンが得られることが示された。

【0212】〈第2の実施の形態〉本実施の形態の特徴を持つ他のマスクの一つを作成する手順について図5のフローチャートに従って説明する。

【0213】図23 は本実施の形態における単位マスクに対応する単位画素区画の形状、大きさ、および同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す。このマスクの第1の実施の形態のマスクとの違いは、黒く塗りつぶされた16個の要素画素区画に加え、薄いグレーで塗りつぶした16個の要素画素区画も全く同じドット配列を持つ要素画素区画とし実質的なマスクの記憶容量をさらに減らすとともに、非等方性をさらに強めたことである。

【0214】図24 に、図5のステップS2 において決められた、出力画面上での単位マスクに対応する128×128画素の単位画素区画の二次元的な配列の様子を示す。 画面右側に示された矢印と番号の持つ意味は図15 の場合と同様である。

【0215】本実施の形態における図5のステップS3と 54とを図25により説明する。同図は、本実施の形態におけるマスク1枚分に相当する単位画素区画内の2階調目のドットパターンの一部を示し、濃いグレーで塗りつぶされた要素画素区画の組と薄いグレーで塗りつぶされた要素画素区画の組とはそれぞれが全階調において全く同じドットパターンを持つ。また、16×16の各要素画素区画の(4,4)画案に打ってあるドットが1階調目のドットパターンであり、分散ドットディザ法の1階調目のドットパターンに一致する。

【0216】同じドットパターンを持つ要素画素区画の 組のそれぞれの要素画素区画の(12,12)画素に打ってあ るドットは 2階調目のドットであり、これらも分散ドッ ・トディザ法の 2階調目のドットの位置に一致する。それ ら以外の要素画素区画内には7×7の小画素区画が設けて あり、この 49画素の中からランダムに 1画素を選択し 2階調目のドットとした。

【0217】3階調目以降については、使用した斥力ボ テンシャルを含め、第2の実施の形限と全く同様の図5 のステップS5 に従いドットバターンを形成し、それら に基づきマスクを作成した。

【0218】このようにして作成したマスクを用いて、一様な濃度を持った入力画像について600dpiの BJプリンタにより 256×256画素の画面サイズにドットパターンを出力した。8階調目のドットパターンを図27に示す。これらの図は、600dpiの BJプリンタにより得られた実画面を縦横10倍の大きさに拡大して出力した。単位マスクに対応する単位画案区画はこれら画面のちょうど 1/4 の大きさであり、図26、27 に示されたドットの分布から、単位マスク自体の持つ周期性を明確に読み取ることが出来る。

【0219】図28、29 に、本実施の形態による単位マスク一枚のみによって生成した32階調目のドットパターン(128×128画素)に関する空間周波数特性を示す。図28 は半径方向の一次元周波数特性を示すが、ノイズ成分の上に鋭いピークを持った孤立的スペクトルが何本も乗っている。第1の実施の形態の場合(図19)と比較すると、ノイズ成分に対し、孤立スペクトルのピークの高さが相対的に高くなっている。同じドットパターンを持つ要素画素区画の組を倍に増やし周期性を強めたからである。

【0220】図29 は非等方性を示す。非等方性の平 均値自体が、特に非等方的とされる4個を越え、7dB弱あ り、極大値は極めて非等方的とされるレベルの 10dBを 越え、最大14dBに達する。両方の値共、誤差拡散法で非 青色ノイズ特性と判定されるレベルより高く、このドッ トバターンは明らかに非青色ノイズ特性を持つ。

【0221】高い非等方性を示す周波数と一次元周波数 特性における孤立的スペクトルの周波数とが一致する場合は、マスク自体の周期性に起因するスペクトルを示す

【0222】以上のようなスペクトル特性は 32階割目 に限らず他のすべての階調において見られるので、本実 施の形態の単位マスクは明らかに非青色ノイズ特性を持

【0223】図30、31 に、本実施の形態による単位マスクによって、スペクトルを評価する際の標準となる 256×256画案の画面サイズに生成した 32階調目のドットパターンに関する空間周波数特性を示す。図30は半径方向の一次元周波数特性を示し、実線が本実施の形態、破線は 256×256の大きさの青色ノイズマスクを用いた場合を示す。単位マスクー枚分のみの場合に比べノイズ成分が大幅に減少し、高く鋭いビークを持った多

数の孤立的スペクトルによって構成されている。

【0224】図31 は非等方性を示す。実線は本実施の形態、破線は 256×256の大きさの育色ノイズマスクを用いた場合を示す。本実施の形態の場合には、平均値自体が13dB程度の極めて強い非等方性を示し、15dBを越える極大値を示すスペクトルが数多く存在し、中には20dB近傍を示すスペクトルが存在する。

【0225】以上のように分散ドットディザ法と同程度の極めて強い非等方性を示すにも拘らず、本実施の形態では128×128の大きさの音色ノイズマスクに関し図72のグレースケールに示したような同一パターンの繰り返しによる周期的な虚像は感知されなかった(本実施の形態のマスクによるグレースケールを図66に示した)。

【0226】また、低い階調工陰影がなだらかに変化する入力画像を本実施の形態のマスクと256×256の大きさの青色ノイズマスクとを用いて処理した出力画像を比較した場合においても、なだらかな陰影の再現性は本実施の形態のマスクを用いた場合の方が若干上回った。このようなドット分布に関する一様性の良さは本実施の形態の場合においても数値的に裏づけられた。

【0227】以上のように視覚的に好ましいドットパターンを生成するマスクの大きさは、対応する育色ノイズマスクの大きさの1/4 で済むことになる。しかも、16個の同じドットパターンを持つ要素画素区画の二組は、全く同じ関値配列を持つので、独立した関値配列を持った要素マスクの数は、34個となり、実質的には、34/256-0.13 となり、約 1/8 である。即ち、記憶装置からの読み出し方を工夫することにより、本実施の形態のマスクを記憶するための記憶容量は256×256 の大きさの育色ノイズマスクの場合の約 1/8 で済ますことが出来る。【0228】以上の評価結果は、本実施の形態のマスクも、図68に示した育色ノイズ特性に関する理論体系(scheme)にではなく、図1 に示した新たな理論体系に基づいていることを示すものである。

2 1

į.

【0229】〈第3の実施の形態〉本実施の形態の特徴を持つ他のマスクの一つを作成する手順について図5のフローチャートに従って説明する。

【0230】図32 は本実施の形態における単位マスクに対応する単位画素区画の形状、大きさ、および同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す。 黒く塗りつぶされた4個の要素画素区画の組と、 薄いグレーで塗りつぶされた4個の要素画素区画の組とは、それぞれ全階調において全く同じドット配列を持つ。

【0231】図33 に、図5のステップS2 に基づき、 出力画面上で単位マスクに対応する64×64画案の単位画 素区画が二次元的に配列される様子を示す。同図から明 らかなように、単位画素区画の縦方向の配列は、それを y方向に単純に並べただけであるが、横方向(x方向)に は、単純に並べるのではなく、隣の単位画素区画を縦方 向に 32画素分ずらして配列する。このように配列する 意図は、同じ小規模パターンが単純に縦横整然と並ぶこ とによって、周期構造が目に感知し易くなるのを避ける ことと、同様の理由により紙送りのムラが原因で入る横 方向の筋ムラを軽減するためである。このように、横方 向の筋ムラを軽減するには、隣り合った縦方向の単位画 素区画の配列同士を、例えば、y軸の正方向に 16画素分 ずつずらすようにするとより効果的である。

【0232】一方、縦方向の筋ムラを軽減するには、隣 り合った横方向の単位画素区画の配列同士を、x軸の正 方向に16画素分ずつずらすようにするとよい。

【0233】なお、本実施の形態では、便宜上図33 に太い点線で示した 64×128画業の長方形の画素区画に 対応するマスクを用いた。ドットパターンを生成する際 にそのマスクを繰り返し走査しつつ使用する順序は、同 図の右側に示した。

【0234】本実施の形態における図5 のステップ53と S4 とを図34 により説明する。簡単のため、単位マスクサイズを32×32として説明する。従って、単位画素区画の大きさも図34 に示すように 32×32画素とする。さらにここでは、横隣の単位画素区画とは y方向に

16画素分ずれているとする。 濃いグレーで塗りつぶされた一組の要案画素区画は全階調において全く同じドットパターンを持つ。

【0235】16×16の各要素画素区画の(4, 4) 画素に打ってあるドットが 1階調目のドットパターンであり、分散ドットディザ法の1階調目のドットパターンに一致する。同じドットパターンを持つ要素画素区画の組のそれぞれの要素画素区画の(12, 12) 画素に打ってあるドットは 2階調目のドットであり、これらも分散ドットディザ法の 2階調目のドットの位置に一致する。それら以外の要素画素区画内には 7×7=49 画素の小画素区画が設けてあり、この 49画素の中からランダムに 1画素を選択し 2階調目のドットとする。ただし、49画素すべてが同じ確率で選択されるわけではなく、中心の画素の位置を原点として、図35 に示すようなガウス型の重み付けを行ない、中心に近い画素ほど選択され易くしている。【0236】ここで用いたガウス型関数は次式で与えられる。

【0237】 【外4】

 $W = e^{\frac{P-V}{2\sigma^2}} \qquad (\hbar \hbar U \sigma^2 = 4)$

(6)

【0238】以上の方法で図32 に示した単位画案区画の 2階調目までのドットパターンを作成した結果を図36 に示した。このように、2階調目のドット位置に不規則性を導入する際、7×7-49 画素の小画素区画を設けドットの位置を規制した上にさらに重み付けをして規制する理由は、マスクの規模が小さくなると、不規則性を導入するドットの数が減り、小画素区画による規制のみではそれらランダムに選択されたドットの位置に偏りが生じ、小規模ドットパターンの繰り返しによる周期性が感知され易くなるからである。実際、マスクの規模が大きい第2の実施の形態では、不規則性を導入する2階調目のドット数が32個もあり、小画素区画による規制のみでは、不規則性を導入する2階調目のドット数が32個もあり、小画素区画による規制のみでは、それらドットの位置の偏りが少なくなるように制御するのは困難であった。

【0239】本実施の形態における3階調目のドットバターンを形成する方法について図34 に戻って説明する。これまでの実施の形態のように単位画素区画が出力画面上級横に整然と配列される場合と異なり、隣り同士の単位画素区画間に境界に沿った位置ズレが生じる場合があるので、その境界における斥力ボテンシャルの処理の仕方を変えなければならない。

【0240】図34 において、ドットパターンを形成する単位画案区画43 の 1階調目のドット44を例に、そのドットに付与された斥力ポテンシャルの処理の仕方を説明する。

【0241】その斥力ポテンシャルが単位画素区画43

の内部に及ぶ範囲を実線45 で示した。単位画素区画43 の上側の境界から外部にはみ出し、破線 46で表したポテンシャルの部分については、その境界に沿った単位画素区画のズレはないのでそのままの形で下側の境界の内部に平行移動する。ポテンシャルのこの部分は、単位画素区画43 の下隣の単位画素区画中、単位画素区画43 の1階調目のドット43に対応する同じく 1階調目のドット4%に付与した斥力ポテンシャルが、単位画素区画43の内部に及ぼすポテンシャル50に等しい。

【0242】単位画素区画 43 の左側斜め上に16画素分 ズレた単位画素区画にはみ出し、一点鎖線で表したボテ ンシャルの部分47については、右側斜め下に16画素分ズ レた単位画素区画中、単位画素区画43 の 1階調目のド ット44 に対応する同じく1階調目のドット51 に付与し た斥力ボテンシャルが、単位画素区画43 の内部に及ば すボテンシャル52として移行させる。

【0243】単位画素区画 43 の左側斜め下に16画素分 ズレた単位画素区画にはみ出し、一点鎖線で表したボテンシャルの部分47については、右側斜め上に16画素分ズレた単位画素区画中、単位画素区画43 の 1階調目のドット45 に対応する同じく1階調目のドット53 に付与した斥力ボテンシャルが、単位画素区画43 の内部に及ぼすボテンシャル54として移行しドット44 に付与された「ケカボテンシャルの処理が完了する。

【0244】単位画素区画43の内部に打たれた他のドットすべてに同様の方法で斥力ポテンシャルを付与し、単位画素区画43の内部で斥力ポテンシャルが最小とな

る 画素 55 に3階調目の最初のドットを打つ。新たに打たれたドットに付与された斥力ポテンシャルを重ねるようにして、残された三つの要素 画素 区画に一個ずつ新たなドットを打つことにより3階調目のドットパターンが完成する。

【0245】以上、本実施の形態における斥力ポテンシャルの単位画素区画の境界における処理の仕方を分かりやすく説明するために、図34では小規模な単位画素区画と斥力ポテンシャルを用いたが、そのような処理の仕方を、図36の単位画素区画と図8で示した斥力ポテンシャルとに適用し、本実施の形態の3階調目のドットパターンが作成出来る。

【0246】従って、3階調目以降については、境界における斥力ボテンシャルの処理の仕方は変化したものの、第2の実施の形態について詳しく説明した図5のステップ55に従ってドットパターンを形成し、それらに基づきマスクを作成した。

【0247】このようにして作成したマスクを用いて、一様な濃度を持った入力画像について600dpiの BJプリンタにより 256×256画素の画面サイズにドットパターンを出力した。8階調目のドットパターンを図38に示す。これらの図は、600dpiの BJプリンタにより得られた実画面を縦横10倍の大きさに拡大して出力した。64×64の単位マスクに対応する単位画素区画はこれら画面の 1/16 の大きさであり、図26、27 に示されたドットの分布から、単位マスク自体の持つ周期性を明確に読み取ることが出来る。

【0248】図39、40 に、本実施の形態による単位マスクー枚のみによって生成した32階調目のドットパターン(64×64画素)に関する空間周波数特性を示す。図39は半径方向の一次元周波数特性を示すが、ノイズ成分の上にピークを持った孤立的スペクトルが何本も乗っていることがわかる。

【0249】図40 は非等方性を示す。平均値は3dB 強の値を示し、マスク法では特に非等方的とされるレベルの4dB を越える極大値を示すスペクトルが数多く存在する。また、6dB程度の極大値を持つスペクトルも存在するので、このドットパターンが非骨色ノイズ特性を持つことは明らかである。一次元周波数特性におけるピークと非等方性におけるピークの周波数が一致する場合、例えば 0.24/s や 0.41/s 等はマスク自体の周期性に起因するスペクトルである。

【0250】以上のようなスペクトル特性は 32階調目に限らず他のすべての階調において見られるので、本実施の形態の単位マスクは明らかに非青色ノイズ特性を持つ。図41、42 に、スペクトルを評価する際の基準となる 256×256 画素の画面サイズに生成した本実施の形態の単位マスクによる 32階調目のドットパターンに関する空間周波数特性を示す。図41 は半径方向の一

次元周波数特性を示し、実線が本実施の形態、破線は 2 56×256の大きさの青色ノイズマスクを用いた場合を示す。ノイズ成分が極めて少なく、殆ど高く鋭いビークを持った孤立的スペクトルによって構成されていると言っても過言ではない。

【0251】図42は非等方性を示す。実線は本実施の形態、破線は256×256の大きさの青色ノイズマスクを用いた場合を示す。本実施の形態の場合には、平均値自体が16dB程度と極めて強い非等方性を示し、極大値が20dBを越えるスペクトルも存在する。他の階調でも同様の非等方性を示すので、これまでの実施の形態の中では最も非等方的である。

【0252】以上のように分散ドットディザ法と同様の、極めて強い非等方性を示すにも拘らず、本実施の形態では 64×64の大きさの背色アイズマスクを用いた際に現れる図73 に示されたような同一パターンの繰り返しによる周期的な虚像は感知されなかった。

【0253】また、低い階調で陰影がなだらかに変化する入力画像を本実施の形態のマスクと256×256の大きさの青色ノイズマスクとを用いて処理した出力画像を比較した場合においても、なだらかな陰影の再現性は本実施の形態のマスクを用いた場合の方が若干上回った。このようなドット分布に関する一様性の良さは本実施の形態の場合においても数値的に裏づけられた。

【0254】以上のように視覚的に好ましいドットパターンを生成するマスクは、本実施の形態では図33 に示したように 64×128 の大きさであったが、記憶装置からの読み出し方を工夫することにより、64×64の大きさの単位マスクを用いることが出来る。

【0255】この大きさは256×256の青色ノイズマスクの大きさの1/16 である。しかも、4個の同じドットパターンを持つ要素画素区画の二組は全く同じ間値配列を持つので、独立した関値配列を持った要素マスクの数は 10個となり、実質的には 10/256=0.039、即ち約 1/25となる。即ち、記憶装置からの読み出し方を工夫することにより、本実施の形態の単位マスクを記憶するための記憶容量は 256×256の大きさの背色ノイズマスクの場合の 1/25 で済ますことが出来る。

【0256】以上の評価結果は、本実施の形態のマスクも、図68に示した音色ノイズ特性に関する理論体系(scheme)にではなく、図1に示した新たな理論体系に基づいていることを示している。

【0257】〈第4の実施の形態〉本実施の形態の特徴を持つ別のマスクの一つを作成する手順について説明する。

【0258】図43 は本実施の形態における単位マスクに対応する単位画業区画の形状、大きさ、および同じドット配列を持つ要素画素区画を示す。本実施の形態では、図から明らかなように、マスクの外形を十字型にしたため、集団ドットディザ法に関する公知例(USP 4,75

(28) #2000-59626 (P2000-5964

3.822)から引用した図83、84に示されたと同様、プリンタの主走査方向とマスクの配列方向とに傾きを与えることが出来る。即ち、第3の実施の形態では、マスクの配列を出力画像面の x方向か y方向かどちらか一方向にしかずらせられなかったが、本実施の形態では、二次元的にずらすことが出来るので、主走査方向と副走査方向のムラの両方に同時に対処出来る。

【0259】図43 において、濃いグレーで塗りつぶされた5個の要素画素区画の組と、薄いグレーで塗りつぶされた5個の要素画素区画の組とは、それぞれ全階調において全く同じドット配列を持つ。従って要素画素区画は全部で20個あるが、独立した要素マスクは12個となるので、単位マスクを記憶するための実質的な記憶容量は 256×256 の大きさの青色ノイズマスクの場合の約 1/20 で済ませられる。

【0260】木実施の形態において実際に作成した単位マスクの外形を図44に示す。2×2=4個の要素画素区両を1プロックとしたとき、この単位画素区画はAからDまでの5ブロックあり、それぞれのブロックは図43に示された AからDまでの5ブロックに対応する。従って、マスクを二次元的に配列して得られるドットバターンは図43に示したマスクによるものと全く同じに出来るが、マスクの外形を形作る辺の数が少ない分マスク作成の際の境界における斥力ボテンシャルの処理が簡単になる。

【0261】図45 に単位マスクの配列の仕方に対応する単位画素区画の配列の様子を示す。同図から容易にわかるように、太い点線57 で示した160×160の正方形のマスクとして用いることも出来る。

【0262】本実施の形態における図5のステップ53と 51とを 図46により説明する。第1階調目は、すべての要素画素区画内の(4.4) 画素にドットを打つ。同じドットパターンを持つ要素画素区画の組は、2階調目を(12,12) 画素に打つ。これらのドットの位置は、分散ドットディザ法の2階調目のドットパターンに一致する。個々の独立したドットパターンを持つ要素画素区画における2階調目のドットパターンに不規則性(摂動)を導入する方法は、第3の実施の形態と全く同様とする。即ち、それらの要素画素区画の(12,12) 画素を中心とする 7×7の小区画を設け、そこに含まれる各画素に図35に示したガウス型の重み付けをした後ランダムに1画素を選択する。このようにして単位画素区画に関する第2階調目のドットパターンを図46のように決めることが出来る。

【0263】本実施の形態の場合も、単位画素区画の二次元的な配列の仕方が単純ではないので、境界外に及ぶ 斥力ボテンシャルの処理の仕方が煩雑になる。しかし、 そのような場合の基本的な処理法は第3の実施の形態で 詳しく説明したので、それに做えば良い。

【0264】従って第3階調目以降のドットパターンの

形成の仕方は、第3 の実施の形態と同様にして図5 の ステップS5 以下に従って作成出来、ディザマトリック スが完成する。

【0265】このようにして作成したマスクを用いて、一様な濃度を持った入力画像について600からのBJプリンタにより256×256画素の画面サイズにドットパターンを出力した。8階調目のドットパターンを図47に、32階調目のドットパターンを図48に示す。これらの図は、600dpiのBJプリンタにより得られた上記の大きさの実画面を縦横10倍に拡大して出力した。図47、48に示されたドットの分布から、単位マスク自体の持つ問期性を読み取ることが出来る。

【0266】図49、50 に、本実施の形態に関わる単位マスクー枚のみによって生成した 32階調目のドットパターンに関する空間周波数特性を示す。図49 は半径方向の一次元周波数特性を示す。空間周波数特性は、通常、高速フーリエ変換(FFT)のアルゴリズムを用いて評価するので画素区画が n を整数として 2n×2nである必要がある。従って、本実施の形態の場合は、128×128画素の画面サイズとし、単位画素区画の外部は全画素にドットが打たれているとして評価した。

【0267】比較対象としての青色ノイズマスク法では、マスクの作成に高速フーリエ変換を用いるので本実施の形態のような形状のマスクを設計することは極めて困難である。

【0268】従って、ここでは、便宜的に128×128の肯 色ノイズマスクで生成したドットパターンから、本実施 の形態の単位画素区画の形状に切り取ったドットパター ンを用いて比較した。

【0269】図49 はそのようにして比較評価した単位マスクー枚分の大きさの32階調目における一次元パワースペクトル、図50は非等方性である。一次元パワースペクトルを見ると、二つの方法共に0.1/s、あるいは0.15/s よりも低周波数側に極めて高いスペクトルがある。これは正方形と異なる単位画素区画内のドットパターンをそれより大きい 128×128画素の画面で評価したことに起因する。従って、その影響の少ない 0.2/s 以上の周波数領域で比較することにする。

【0270】一次元パワースペクトルでは、本実施の形態の方が青色ノイズマスク法に比べ、相対的に高く鋭い孤立スペクトルを有する。0.2/s以上の周波数領域で非等方性を見ると、青色ノイズマスク法は平均的には 0dBを示すので等方的である。非等方性の強いスペクトルでも3dD弱の値であるので、その値自体は、摂動誤差拡散法の最も高い非等方性を示すスペクトルとほぼ同等である。一方、本実施の形態の場合は平均値が2dB強の値を示し、特に非等方的とされるレベルの4dBを越える極大値を示すスペクトルが数多く存在し、6dBを越えるスペクトルもあるので明らかに非等方的であり、従って非青色ノイズ特性を持つと言える。参考に、単位画素区画自

体の形状の影響を取り除くため、本実施の形態の非等方性の値から背色ノイズマスク法の非等方性の値を差し引くと図51 が得られる。 青色ノイズマスク法の場合を等方的であるとすると、本実施の形態ではさらに非等方性が強く現れる。

【0271】以上のようなスペクトル特性は 32階調目に限らず他のすべての階調において見られるので、本実施の形態の単位マスクは明らかに非青色ノイズ特性を持つ。本実施の形態のマスクが非青色ノイズ特性を持つことは、別の角度からも裏付けられる。即ち、本実施の形態の単位マスクは第3の実施の形態の単位マスクより大きい分、周期性、従って非等方性が強くなる。第3の実施の形態のマスクは非青色ノイズ特性を持つことは当然のこととなる。

【0272】図52、53 に、スペクトルを評価する際の基準となる 256×256 画素の画面サイズに生成した本実施の形態の単位マスクによる 32階調目のドットパターンに関する空間周波数特性を示す。図52 は半径方向の一次元周波数特性を示し、実線が本実施の形態、破線は 256×256の大きさの青色ノイズマスクを用いた場合を示す。本実施の形態の場合、ノイズ成分が極めて少なく、高く鋭いピークを持った孤立的スペクトルによって構成されている。

【0273】図53 は非等方性を示す。実線は本実施の形態、破線は 256×256の大きさの青色ノイズマスクを用いた場合を示す。本実施の形態の場合には、平均値自体が12個程度の極めて強い非等方性を示し、20個を超えるスペクトルも存在する。

【0274】以上のようなスペクトル特性は 32階調目 に限らず他のすべての階調において見られるので、本実 施の形態のマスクで生成されるドットパターンは明らか に青色ノイズパターンではない。

【0275】以上のように分散ドットディザ法と同様、 極めて強い非等方性を示すにも拘らず、本実施の形態の 0.8倍とほぼ同等の大きさを持つ 64×64の青色ノイズ マスクに関し図73 のグレースケールで示したような 同一パターンの繰り返しによる周期的な虚像は殆ど感知 されなかった(本実施の形態のマスクによるグレースケールを図67 に示した)。

【0276】また、低い階調で陰影がなだらかに変化する人力画像を本実施の形態のマスクと256×256の大きさの青色ノイズマスクとを用いて処理した出力画像を比較した場合においても、なだらかな陰影の再現性は本実施の形態のマスクを用いた場合の方が若干上回った。このようなドット分布に関する一様性の良さは本実施の形態の場合においても数値的に裏づけられた。

【0277】以上の評価結果は、本実施の形態のマスク も、図68に示した背色ノイズ特性に関する理論体系(s cheme)にではなく、図1に示した新たな理論体系に基づ いていることを示している.

【0278】〈第5の実施の形態〉木実施の形態の特徴を持つさらに別のマスクの一つを作成する手順について 説明する。

【0279】図54 は本実施の形態における単位マスクに対応する単位画案区画の形状、大きさ、および同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す。本実施の形態でも、マスクの外形を第4 の実施の形態と同様十字型にしたため、主走査方向と副走査方向のムラの両方に同時に対処出来る。

【0280】図54 において、個々の要素画素区画が、☆や◆などのパターンで区別されているが、同じパターンを持つ要素画素区画の組は、全階調において全く同じドットパターンを持つ。この例では、要素画素区画は全部で20個あるが、同一パターンを有する要素画案区画の組が8組あるので、独立した要素マスクは10個となりこれまでに示した実施の形態の中では、第3 の実施の形態と並んで独立した要素マスクの数が最も少ない。従って、単位マスクを記憶するための記憶容量は256×256の大きさの青色ノイズマスクの場合の 1/25 で済ませられる

【0281】図55 は、本実施の形態において実際に作成したマスクの外形を示し、この点に関しても第4 の実施の形態と全く同じである。同図では、全く同じ関値配列を持つ要素マスクの粗の配置を破線の矢印で示したが、矢印58で示した…粗を除き、それらの配置が一定の周期性に従っていることが分かる。

【0282】図56 に単位マスクの配列の仕方に対応 する単位画素区画の配列の様子を示し、この場合も第4 の実施の形態と全く同じであり、太い点線59 で示した1 60×160の正方形のマスクにして用いることも出来る。

【0283】本実施の形態が第4の実施の形態と異なる 点は、第2階調目におけるドットパターンの決め方にある。

【0284】一般に、マスクの大きさが小さくなりドットパターンにムラがあると、単位画素区画の配列方向に周期的な虚像が現れる。本実施の形態の配列方向をベクトルと qで表すと、pと qに平行な方向に最も稿模様が現れ易くなる。ここで pとqは、単位画素区画が、隣接する単位画素区画に向けて平行移動して重なり合うための方向と距離とを表し、それらのベクトルは互いに直交している。

【0285】また、画素が x軸及び y軸と平行な格子点上にしか位置し得ず、1階調目が、まさに格子点上に並んでいるので、これら二つの方向にも、pと qの方向に次いで、縞模様が現れる可能性が高い。

【0286】本実施の形態において、これらの箱模様が現れにくくするための2階調目のドットパターンの決め方について図57、58を用いて説明する。

【0287】図57 は、2階調目までのドットが打たれ

ている単位画素区画である。各要素画素区画の(4, 4)画素は1階調目のドットであり、(12, 12)画素を中心とする 7×7 の小区画内にはすでに 2階調目のドットが打たれている。これら2階調目のドットは、小区画が持つ 7×7=49画素 の中からランダムに決められた訳ではなく予め定められた 4画素の一つから一定の規則に従って選択されている。その選択のための規則性をベクトル中に平行な直線上に位置する二つの小区画60、61と、ベクトル中に平行な直線上に位置する二つの小区画60、62とを例にとり、図58を用いて説明する。

【0288】図57 において、小区画60 と61 とをpの 方向から見て、また小区画60 と62とをqの方向から見て みたとき、どちらの方向から見てもそれぞれの小画素区 画の中心から等距離になる画素の位置は pと qのなす角 度を二等分する方向にある。

【0289】また、それぞれの小画素区画を x軸と y軸の方向から見た時、同じくどちらの方向から見てもそれぞれの小画素区画の中心から等距離になる画素の位置は x軸と y軸のなす角度を二等分する方向にある。

【0291】従って、図57で、小区画60の中から2階調目のドットを打つ画素を、図58の画素67に相当する画素に決め、その位置をベクトル aで表した時、小区画61と62の中からはドット分布の偏りを避けるためーaに位置する画素がそれぞれ選択される。

【0292】ブロックAの中の他の三つの小区画63、6 4、65については、同じく二方向から見た時のドットの 偏りを避けるため、図58 の残りの象限に位置する画 素68、69、70 に相当する画素がそれぞれ選択され、そ れに応じ他のブロックにおいてそれぞれ二つずつの小区 画で選択される画素が決まる。他の小区画においても同 様の決め方により図58 の4画素の一つに相当する画素 を選択し、そのような決め方が出来ない場合も、二方向 から見た時のドットの偏りを避けるように図58の4画 素の一つに相当する画素を選択し、全要素画素区画に第 2階調目のドットをすべて打ち終えた段階が図57に示 されている。

【0293】本実施の形態の場合、図5 に示したアルゴリズム上の順序とは逆であるが、第2階調目に打つドットの位置を決めた後に図55 に示された同じドットパターンを持つ要素画素区画の組を決める。例えば、A

ブロックの 1番目の要素画素区画と Bブロックの 4番目の要素画素区画を一組とし、Eブロックの 3番目の要素 画素区画と Cブロックの 2番目の要素画素区画を一組と するというようにしてそれぞれの組を決めて行き図55 に示された組み合わせを決める。

【0294】第3階調目以降のドットバターンの形成の 仕方は、第3の実施の形態、あるいは第4の実施の形態 と同様にして図5のステップS5以下に従って作成出 来、ディザマトリックスが完成する。

【0295】このようにして作成したマスクを用いて、一様な濃度を持った入力画像について600ゆiの BJプリンタにより 256×256画素の画面サイズにドットパターンを出力した。8階調目のドットパターンを図59 に、32階調目のドットパターンを図60に示す。これらの図は、600ゆiの BJプリンタにより得られた実画面を縦横10倍の大きさに拡大して出力した。第3 の実施の形態以下、小規模のマスクを用いた中では、一様性が最も優れていて、また、本実施の形態の狙い通り、x軸、及び y 軸方向に平行なドット分布のムラもない。

【0296】図61、62、63 に、本実施の形態に よる単位マスク一枚のみによって生成した 32階調目の ドットパターンに関する空間周波数特性を示す。マスク の形状が第4 の実施の形態と同じであるので、マスクー 枚分のドットパターンに関する空間周波数特性は、第4 の実施の形態の場合と同様の方法で評価した。

【0297】図61 はそのようにして比較評価した32 階調目の一次元パワースペクトル、図62 は非等方性である。二つの方法共に 0.1/s、あるいは 0.15/s よりも低周波数側に異形の単位画素区画を正方形の画面で評価したことに起因する高いスペクトルがあるので、その影響の少ない 0.2/s 以上の周波数領域で比較する。

【0298】 一次元パワースペクトルでは、本実施の形 態の方が青色ノイズマスク法に比べ、相対的に高い孤立 スペクトルを有するが、第4の実施の形態に比べると違 いは少ない。 0.2/s 以上の周波数領域で非等方性を見 ると、青色ノイズマスク法は平均的にはOdBを示すので 等方的であり、非等方性の強いスペクトルでも摂動誤差 拡散法の最も高い非等方性を示す階調でのスペクトルと 同等である。一方、本実施の形態の場合は平均値は 1.2 dBで、特に非等方的とされるレベルの4dBを越え5dBの極 大値を持つスペクトルも1本ある。このように、マスク 法における非青色ノイズ特性の条件を満たしているの で、このマスク1枚分のドットパターンも非青色ノイズ 特性を持つと言える。参考に、単位画素区画が異形であ るための影響を取り除くため、本実施の形態の非等方性 の値から青色ノイズマスク法の非等方性の値を差し引く と図63 が得られた、青色ノイズマスク法の場合を等 方的であるとすると、本実施の形態でもさらに非等方性 が強く現れ、5dBを越えるスペクトルが2本見られる。本 実施の形態でも一次元のパワースペクトルと非等方性の

スペクトルで、孤立的スペクトルの周波数が一致する場合が複数認められるが、これらはマスク自体に周期性があることを示す。

【0299】他の階調では、32階調目と同等の非等方性を示す階調と、スペクトルの極大値がそれより若干低い値を示す階調とがほぼ半々であった。本実施の形態の単位マスクは、マスク自体が周期構造を持つことを反映し、比較可能な6階調の内 3階調で良好な等方性を示す別ichney による摂動誤差拡散法よりも非等方的である。従って平均値が等方的であることを示す青色ノイズマスク法とは基本的に異なる特性を持つ。

【0300】図64、65 に、スペクトルを評価する際の基準となる 256×256 画素の画面サイズに生成した本実施の形態の単位マスクによる 32階調目のドットパターシに関する空間周波数特性を示す。図64 は半径方向の一次元周波数特性を示し、実線が本実施の形態、破線は 256×256の大きさの肯色ノイズマスクを用いた場合を示す。本実施の形態はノイズ成分が少なく、高く鋭いピークを持った孤立的スペクトルによって構成されている。

【0301】図65 は非等方性を示す。実線は本実施の形態、破線は256×256の大きさの青色ノイズマスクを用いた場合を示す。本実施の形態の場合には、平均値自体が10個程度の極めて強い非等方性を示す。

【0302】以上のようなスペクトル特性は 32階調目 に限らず他のすべての階調において見られるので、本実 施の形態のマスクで基準画面内に生成されるドットパターンは明らかに非青色ノイズ特性を持つ。

【0303】以上のように極めて強い非等方性を示すにも拘らず、大きさでは本実施の形態のマスクと同等(0.8倍)の 64×64の青色ノイズマスクに関し図73 のグレースケールで示したような同一パターンの繰り返しによる周期的な虚像は殆ど感知されなかった。

【0304】また、低い階調で陰影がなだらかに変化する入力画像を本実施の形態のマスクと256×256の大きさの青色ノイズマスクとを用いて処理した出力画像を比較した場合においても、なだらかな陰影の再現性は本実施の形態のマスクを用いた場合の方が若干上回った。この結果は、600dpiのプリンタを用いた場合の最適サイズである256×256の大きさの青色ノイズマスクの約1/13(実質的には 1/25)の大きさしかない本実施の形態のマスクの中間調再現性能が青色ノイズマスクの性能と同等か若干上回ることを示している。

【0305】以上の評価結果は、本実施の形態のマスクも、図68に示した青色ノイズ特性に関する理論体系(scheme)にではなく、図1に示した新たな理論体系に基づいていることを証明している。

【0306】以上詳しく説明したように、従来の音色ノイズマスク法では、マスクサイズを小さくして、基準サイズで評価すると虚像が発生していたが、本実施の形態

によれば、基準となる大きさの画素区画より小さいサイズのマスクを用いて前記基準となる大きさの画素区画内に生成するドットパターンが、視覚的に好ましくない程のコントラストを有するモアレやマスク自体に起因する一定の繰り返しパターン等の虚像を発生することがないので、小さいサイズのマスクで、一様性に優れた高画質な画像を得ることができる。

【0307】また、マスク単独により生成されるドット パターンが全ての階調で、非背色ノイズ特性としたこと で、つまり、規則性を持たせたことで、一様性に優れた 高画質な画像を得ることが出来る。

【0308】また、これまでの分散ドットディザ法の持つ規則性を基本にそのドット配列に弱い揺らぎ(摂動)を与えることにより、分散ドットディザ法に固有の、(1)モアレが発生し易い、(2)画面に規則的な模様が現れる、(3)紙送りムラが縞状ノイズとして現れ易い、という三つの欠点をすべて取り除き、(i)全ての階調においてドット分布の一様性が高い、(ii)マスクの大きさが小さい、という優れた特徴を生かした階調再現が可能となった。

【0309】これらは、例えば、第2の実施の形態のマスクによる図66に示したグレースケールや、第4の実施の形態のマスクによる図67に示したグレースケールにより実証された。

【0310】両図とも600dpiのブリンタを用いて出力した上段左から右へ30、31、32階調目、中段左から右へ40、41、42階調目、下段左から右へ50、51、52階調目のドットパターンを示す。これらは、同様に256×256の大きさの背色ノイズマスクを用いて出力した図71のグレースケールと比較しても勝るとも劣らない画質を有している。それにも関わらず、第2の実施の形態のマスクの大きさは128×128で上記青色ノイズマスクの1/4であるが、同じ関値配列を持つ要素マスクが複数あるので、実質的には約1/8となる。また、第4の実施の形態のマスクは、上記青色ノイズマスクの約1/13であるが、同じ関値配列を持つ要素マスクが複数あるので、実質的には約1/20で済ませられる。ディジタルカメラによるダイレクトプリントシステムにはうってつけの階調再現方法と言える。

【0311】更に本実施の形態の方法は、分散ドットディザ法の持つ規則性の多くを受け継いでいる。従って分散ドットディザ法がそうであるように、プリンタの精細度が上がれば上がる程画質が向上するので、最近の 120 Odpiクラスのプリンタにそのまま適用しても良好な画質が得られることが保証される。青色ノイズマスクのように、プリンタの精細度が上がると、より大きなマスクを必要とすると言うことがない。

【0312】さらに本実施の形態の方法は、第1階調目が、周期性パターンかまたは擬似周期性パターンとなり、さらに高階調においても、マスクの内部に周期性を

持っているので、ドットバターンを見れば、それらの周 期性から本実施の形態のアルゴリズムを用いていること が直ちに判明する。

【0313】以上のように、図1 に示した理論体系に基づく本実施の形態の階調再現法は、(1) 画質が良い、(2) マスクが小型、(3) ソフト盗用の防止が可能、(4) 高精細プリンタにより好適に用いられる、という特徴を持つので、現在から近い将来にむけての高精細ディジタル画像時代に最もふさわしい方法である。ところで、本発明の階調再現装置が、容量の大きな記憶媒体を含む場

合には、各実施の形態で用いた小型のマスクに限らず、例えばより大きな256×256の大きさのマスクを用いることができる。

【0314】なお、前述の実施の形態では、入力画像データを二値のデータに変換する場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、三値以上の多値データに変換する場合に適用することができる。

【0315】三値データに変換する場合について説明す る。

【0316】出力装置が例えばインクジェットプリンタであるとし、そのプリンタが濃淡二つのインクを持つ場合、表現できる値は三値となる。

【0317】人力データが1画素8ビットの256階調のデータであるとすると、128階調目までの入力データはその値を2倍にし、前記実施の形態で作成されたマスクにより、2値化する。この結果1となった場合は淡インクを出力する、入力データが129階調以降256階調目までは、そのまま、前記実施の形態で作成されたマスクにより2値化し、その結果1となった場合は濃インクを出力する。また、別の方法としては、128階調日までは、前記実施の形態で作成したマスクの個々の閾値を1/2

(少数の場合は切り捨て)したマスクを別途用意し、淡インク用のマスクとしてもよい。このようにすると、12 8階調目以下の低い階調は濃インクだけで出力する場合に比べて打たれるドットの数が2倍になるので、入力画像が低階調で緩やかに変化する部分を滑らかに再現できる。

【0318】従って、人の肌の部分などの階調変化の再現性を高めるためにはこの様な多値化技術は重要であり、その際に本実施の形態で作成されたマスクを応用することにより、画質の一層優れた出力画像を得ることができる

【0319】また、木発明をカラー画像処理に応用する場合は、色(例えばY/M/C/K)ごとに、前記実施の形態で作成された、マスクを用い、2値又は多値化処理すればよい。

【0320】また、本発明は、例えば、ホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ、プリンタ等の複数のデバイスによって構成されるシステムにも適用でき、更に、例えば、複写機、ファクシミリ装置等の単体の装

置に適用できる。

【0321】また、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行することにも適用できる。

【0322】この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が、上述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

【0323】プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッビディスク、ハードディスク、光ボィスク、光磁気ディスク、CD—ROM、CD—R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM等を用いることができる。

【0324】また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS(オペレーティングシステム)等が実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によって、上述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0325】さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によって、上述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

[0326]

【発明の効果】以上説明した如く本発明によれば、小型のマスクでドット分布の一様性に優れた高画質な画像を得ることができるとともに、高精細プリンタにおいてもマスクサイズを大きくする必要が無く、マスクを記憶しておくためのメモリ容量を小さくすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施の形態のマスク法が準拠する理論体系を示す図である。

【図2】本実施の形態の方法の規則性(2)と(3)を説明する図である。

【図3】本実施の形態の方法の規則性(4)を説明する図である

【図4】本実施の形態の方法の規則性(1)と(4)を説明する図である。

【図5】木実施の形態のディザマトリックスを得るまで の各ステップの流れを示すフローチャートである。

【図6】2階調目のドットパターンに摂動を加える方法 を説明する図である。

(33) \$2000-59626 (P2000-5964

【図7】斥力ポテンシャルの形状を概略的に示す図である。

【図8】実施の形態において用いられた斥力ボテンシャルを具体的に示す図である。

【図9】3階調目以降のドットパターンの形成方法を説明するための図である。

【図10】図5のフローチャートでステップS3を変更し、1階調目で擬似周期性パターンを与える方法を示す図である。

【図11】図5のステップ33を変更した場合に2階調目 以降のステップの一例を示した図である。

【図12】図5のステップ\$3を変更した場合に2階調目 以降のステップの他の例を示した図である。

【図13】本実施の形態の画像を処理するための基本システムの構成例を示す図である。

【図14】第1の実施の形態における単位マスクに対応 する単位画素区画の形状、大きさ、及び同じドット配列 を持つ要素画素区画の組を示す図である。

【図15】第1の実施の形態における単位画素区画が出 力両面上二次元的に配列される様子を示す図である。

【図16】第1の実施の形態における図5のフローチャートのステップ83と54とを説明するための図である。

【図17】第1の実施の形態において256×256画素の大きさの画面内に生成した8階調目のドットパターンを10倍に拡大して示した図である。

【図18】第1の実施の形態において256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンを10倍に拡大して示した図である。

【図19】第1の実施の形態における単位マスク一枚の みによって生成した32階調目のドットバターンに関する 半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図20】第1の実施の形態における単位マスクー枚の みによって生成した32階調目のドットパターンに関する 非等方性を示す図である。

【図21】第1の実施の形態における単位マスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図22】第1の実施の形態における単位マスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する非等方性を示す図である。

【図23】第2の実施の形態における単位マスクに対応する単位画案区画の形状、大きさ、及び同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す図である。

【図24】第2の実施の形態における単位画素区画が出 カ画面上二次元的に配列される様子を示す図である。

【図25】第2の実施の形態における図5のフローチャートのステップS3とS4とを説明するための図である。

【図26】第2の実施の形態において256×256画素の大きさの画面内に生成した8階調目のドットパターンを10

俗に拡大して示した図である。

【図27】第2の実施の形態において256×256画業の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンを10倍に拡大して示した図である。

【図28】第2の実施の形態における単位マスクー枚の みによって生成した32階調目のドットバターンに関する 半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図29】第2の実施の形態における単位マスクー枚の みによって生成した32階調目のドットパターンに関する 非等方性を示す図である。

【図30】第2の実施の形態における単位マスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図31】第2の実施の形態における単位マスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する非等方性を示す図である。

【図32】第3の実施の形態における単位マスクに対応 する単位画紫区画の形状、大きさ、及び同じドット配列 を持つ要素画素区画の組を示す図である。

【図33】第3の実施の形態における単位画素区画が出 カ画面上二次元的に配列される様子を示す図である。

【図34】第3の実施の形態における図5のフローチャートのステップ53と54とを説明するための図である。

【図35】第3の実施の形態において小画素区画内から2 階調目のドットを打つ1画素を確率的に決める際に小画 素区画に付与するガウス型の重み付けを示す図である。 【図36】第3の実施の形態における図5のフローチャ

【図37】第3の実施の形態において256×256画素の大きさの画面内に生成した8階調目のドットパターンを10倍に拡大して示した図である。

ートのステップ\$3と\$4とを説明するための図である。

【図38】第3の実施の形態において256×256画案の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンを10倍に拡大して示した図である。

【図39】第3の実施の形態における単位マスク一枚の みによって生成した32階調目のドットパターンに関する 半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図40】第3の実施の形態における単位マスクー枚の みによって生成した32階調目のドットパターンに関する 非等方性を示す図である。

【図41】第3の実施の形態における単位マスクによって256×256画業の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図42】第3の実施の形態における単位マスクによって256×256画案の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する非等方性を示す図である。

【図43】第4の実施の形態において最初に想定された 単位マスクに対応する単位画素区画の形状、大きさ、及 (34) \$2000-59626 (P2000-5964)

び同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す図である。

【図44】第4の実施の形態において実際に作成した単位マスクに対応する単位画業区画の形状、大きさ、及び同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す図である。

【図45】第4の実施の形態における単位画素区画が出 力画面上二次元的に配列される様子を示す図である。

【図46】第4の実施の形態における図5のフローチャートのステップ53と54とを説明するための図である。

【図47】第4の実施の形態において256×256画素の大きさの画面内に生成した8階調目のドットパターンを10倍に拡大して示した図である。

【図48】第4の実施の形態において256×256画業の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンを10倍に拡大して示した図である。

【図49】第4の実施の形態における単位マスクー枚の みによって生成した32階調目のドットバターンに関する 半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図50】第4の実施の形態における単位マスク一枚の みによって生成した32階調目のドットパターンに関する 非等方性を示す図である。

【図51】第4の実施の形態における単位マスクの形状 異方性の影響を除くため、本実施の形態における単位マスクー枚のみによって生成した32階調目のドットパターンに関する非等方性の値から同一マスク形状に切り取った骨色マスクによるドットパターンに関する非等方性の値を差し引いた値を示す図である。

【図52】第4の実施の形態における単位マスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図53】第4の実施の形態における単位マスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットバターンに関する非等方性を示す図である。

【図54】第5の実施の形態において最初に想定された 単位マスクに対応する単位画素区画の形状、大きさ、及 び同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す図であ る。

【図55】第5の実施の形態において実際に作成した単位マスクに対応する単位画素区画の形状、大きさ、及び同じドット配列を持つ要素画素区画の組を示す図である。

【図56】第5の実施の形態における単位画素区画が出 力画面上二次元的に配列される様子を示す図である。

【図57】第5の実施の形態における図5のフローチャートのステップS3とS4とを説明するための図である。

【図58】第5の実施の形態において小画素区画内から2 階調目のドットを打つ1画素を選択するための規則を説 明するための図である。 【図59】第5の実施の形態において256×256画素の大きさの画面内に生成した8階調目のドットバターンを10倍に拡大して示した図である。

【図60】第5の実施の形態において256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンを10倍に拡大して示した図である。

【図61】第5の実施の形態における単位マスク一枚の みによって生成した32階調目のドットバターンに関する 半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図62】第5の実施の形態における単位マスクー枚の みによって生成した32階調目のドットパターンに関する 非等方性を示す図である。

【図63】第4の実施の形態における単位マスクの形状 吳方性の影響を除くため、本実施の形態における単位マ スク一枚のみによって生成した②階調目のドットパター ンに関する非等方性の値から同一マスク形状に切り取っ た青色マスクによるドットパターンに関する非等方性の 値を差し引いた値をす図である。

【図64】第5の実施の形態における単位マスクによって256×256画業の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図65】第5の実施の形態における単位マスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する非等方性を示す図である。

【図66】600dpiのプリンタで第2の実施の形態のマス クを用いて出力したグレースケールの一部を等倍コピー した図である。

【図67】600dpiのプリンタで第4の実施の形態のマスクを用いて出力したグレースケールの一部を等倍コピーした図である。

【図68】 青色ノイズ特性を持つディザ法が準拠する理論体系を示す図である。

【図69】組織的ディザ法の1階調目のドットパターンを示す図である。

【図70】青色ノイズマスク法の1階調目のドットパタ ーンを示す図である。

【図71】600dpiのプリンタで256×256の大きさの骨色 ノイズマスクを用いて出力したグレースケールの一部を 等倍コピーした図である。

【図72】600dpiのプリンタで128×128の大きさの背色 ノイズマスクを用いて出力したグレースケールの一部を 等倍コピーした図である。

【図73】600dpiのプリンタで64×64の大きさの背色ノイズマスクを用いて出力したグレースケールの一部を等倍コピーした図である。

【図74】128×128の大きさの青色ノイズマスクー枚の みによって生成した32階調目のドットバターンに関する 半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図75】128×128の大きさの青色ノイズマスク一枚の

みによって生成した32階調目のドットパターンに関する 非等方性を示す図である。

【図76】125×128の大きさの青色ノイズマスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図77】128×128の大きさの青色ノイズマスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットパターンに関する非等方性を示す図である。

【図78】64、64の大きさの青色ノイズマスクー枚のみによって生成した32階調目のドットパターンに関する半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図79】64×64の大きさの青色ノイズマスクー枚のみによって生成した32階調目のドットパターンに関する非等方性を示す図である。

【図80】64×64の大きさの青色ノイズマスクによって256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のドットバターンに関する半径方向の一次元空間周波数特性を示す図である。

【図81】64×64の大きさの青色ノイズマスクによって 256×256画素の大きさの画面内に生成した32階調目のド ットパターンに関する非等方性を示す図である。

【図82】中間調再現スクリーンに擬似周期的不規則パターンを用いた公知の技術を示す図である。

【図83】集団ドットディザ法において関値マトリック スの形状を十字型にした公知の技術を示す図である。

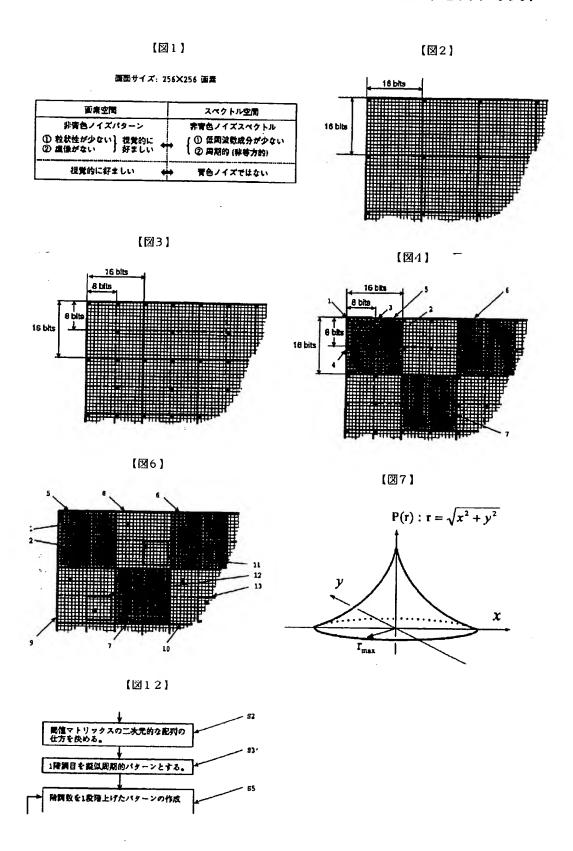
【図84】集団ドットディザ法において関値マトリック スの形状を十字型にした公知の技術において、1階調目 のドットパターンに弱い不規則性(摂動)が導入されたことを示す図である。

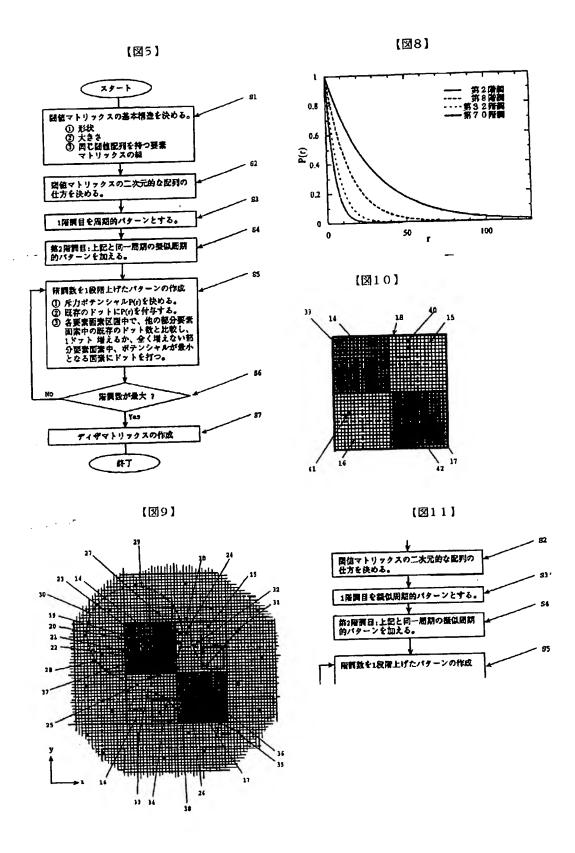
【符号の説明】

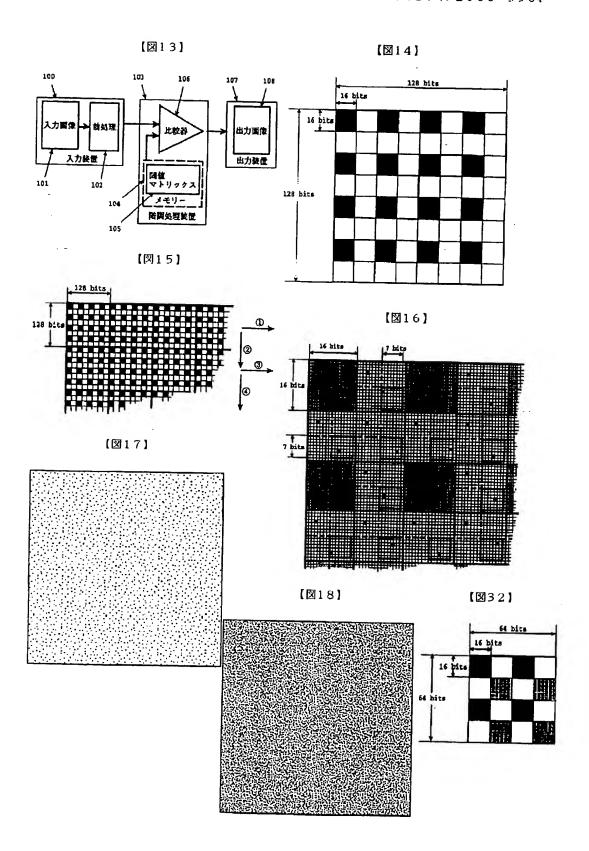
- 1 1階調目にドットを打たれた画業
- 2 2階調目にドットを打たれた画素
- 3 3階調目にドットを打たれた画素
- 4 4階調目にドットを打たれた画素
- 5、6、7 同じドットバターンを持つ要素画素区画8、9、10 独立したドットバターンを持つ要素画素区画
- 11、12、13 小画素区画
- 14、15、16、17 要素画素区画
- 18 単位画素区画
- 19、20、21、22 要素画紫区画14の部分画素 区画
- 23、24、25、26 1階調目のドット
- 27 ドット23に付与された斥力ボテンシャルが単位 画衆区画18の内部に及ぶ範囲を示す円弧

- 28、29、30 ドット23に付与された斥力ポテンシャルが単位画業区画18の外部に及ぶ範囲を示す円弧31 ドット23が打たれた画素に対応する、単位画素区画18の右隣の単位画素区画内の画案に打たれたドット
- 32 ドット31に付与された斥力ボテンシャルが単位 画素区画18の内部に及ぶ範囲を示す円弧
- 33 ドット23が打たれた画素に対応する、単位画素 区両18の下隣の単位画素区画内の画素に打たれたドット
- 34 ドット33に付与された斥力ポテンシャルが単位 画紫区画18の内部に及ぶ範囲を示す円弧
- 35 ドット23が打たれた面案に対応する、単位面案 区面18の右斜め上の単位面素区画内の画案に打たれた ドット -
- 36 ドット35に付与された斥力ポテンシャルが単位 画素区画18の内部に及ぶ範囲を示す円弧
- 37 単位画素区画18の内部で斥力ポテンシャルが最小となる画素
- 38 要素画素区画17の内部で画素37に対応する位 でにある画素
- 39、40、41、42 小画素区画
- 43 単位画素区画
- 44 1階調目のドット
- 45 ドット44に付与された斥力ボテンシャルが単位 画紫区面43の内部に及ぶ範囲を示す円弧
- 46、47、48 ドット44に付与された斥力ボテンシャルが単位画素区画43の外部に及ぶ範囲を示す円弧49 ドット44が打たれた画素に対応する、単位画素区画43の下隣の単位画素区画内の画案に打たれたドット
- 50 ドット49に付与された斥力ポテンシャルが単位 両素区画43の内部に及ぶ範囲を示す円弧
- 51 ドット44が打たれた画素に対応する、単位画素 区画43の右側斜め下に16画素分ずれた単位画業区画 内の画案に打たれたドット
- 52 ドット51に付与された斥力ポテンシャルが単位 画素区画43の内部に及ぶ範囲を示す円弧
- 53 ドット44が打たれた画素に対応する、単位画素 区画43の右側斜め上に16画素分ずれた単位画素区画 内の画素に打たれたドット
- 54 ドット53に付与された斥力ポテンシャルが単位 両素区画43の内部に及ぶ範囲を示す円弧
- 55 単位画素区画43の内部で斥力ポテンシャルが最小となる画素

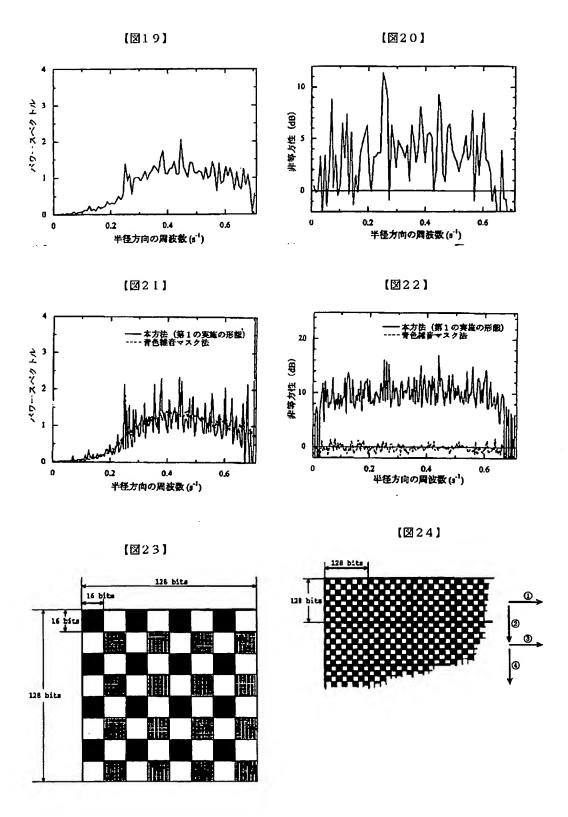
(36) 12000-59626 (P2000-5964



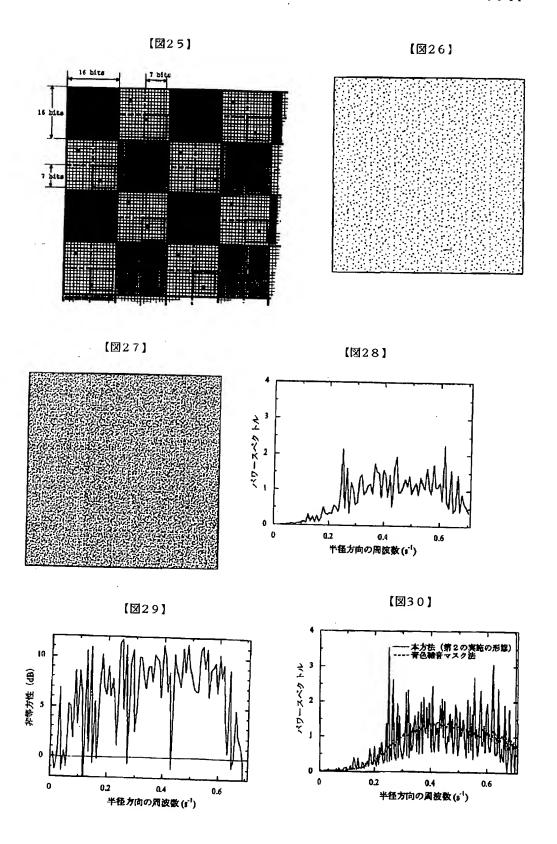




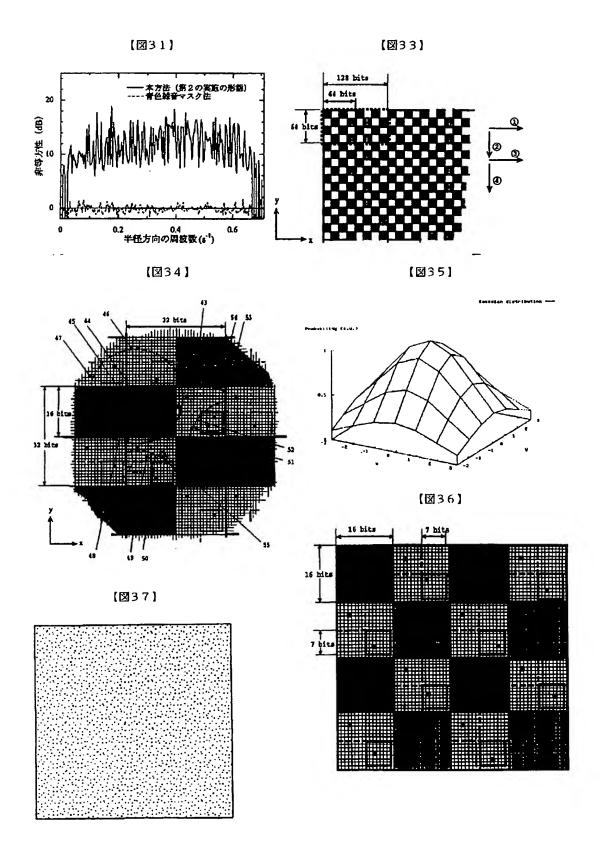
(39) 12000-59626 (P2000-5964



(40) 月2000-59626 (P2000-5964

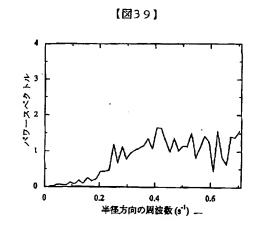


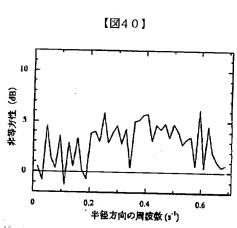
(41) #2000-59626 (P2000-5964

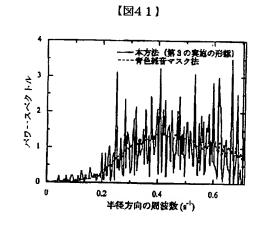


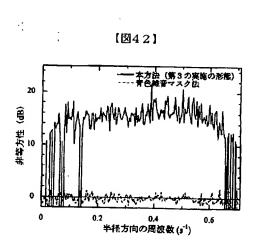
(42) \$2000-59626 (P2000-5964

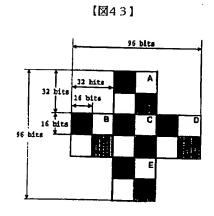
(⊠38)









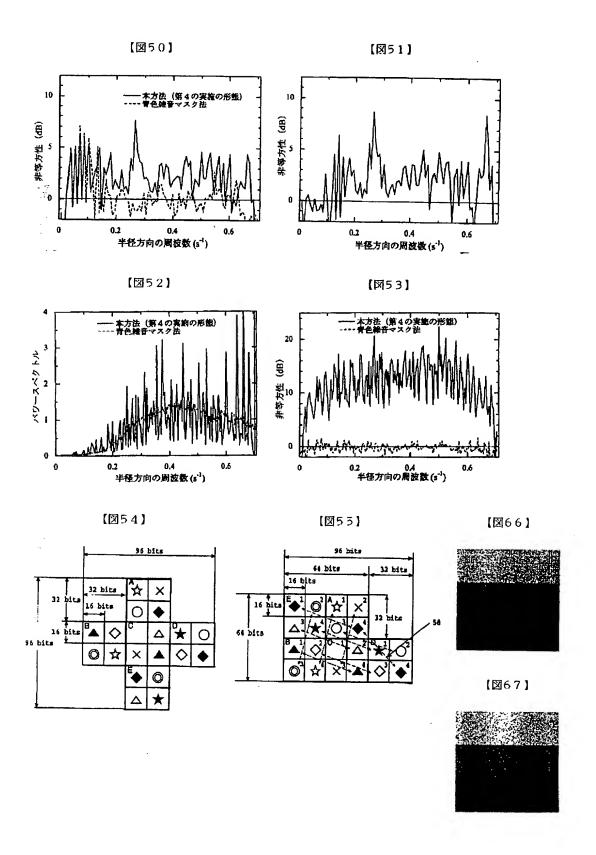


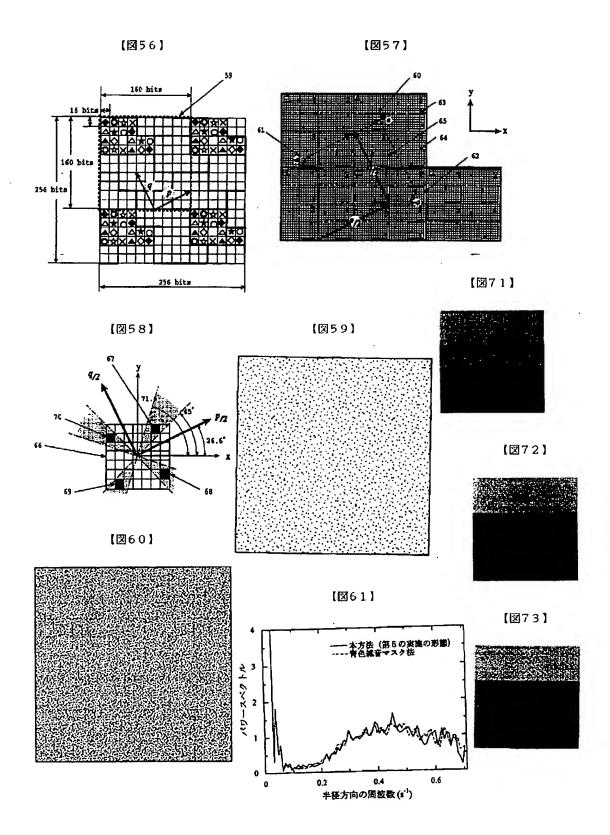
(43) #2000-59626 (P2000-5964

半径方向の周波数 (s⁻¹)

【図44】 【図45】 160 bits 64 bits 32 bits 16 Hts 16 bits 256 bits [247] 【図46】 【図48】 【図49】 カイセンスーロシュ コ コ コ

(44) \$2000-59626 (P2000-5964



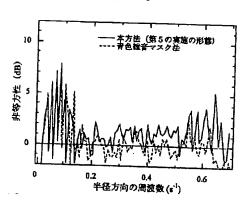


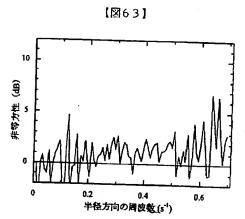
. .

ı.

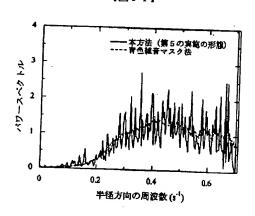
(46) \$2000-59626 (P2000-5964

【図62】

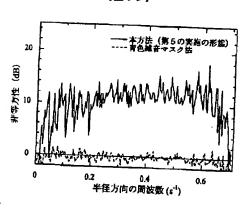




【図64】



[図65]

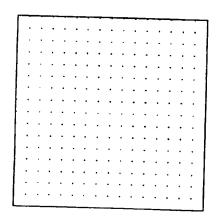


【図68】

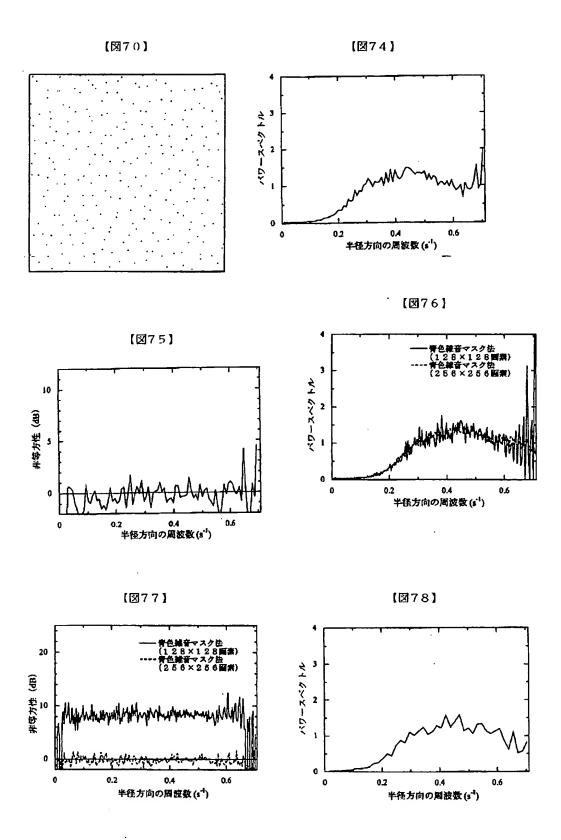
画面サイズ: 256×256 画家

和末生機	スペクトル空間
青色ノイズパターン ① 粒状性が少ない 】 使覚的に ② 歯性がない 】 好ましい	育色ノイズスペクトル
(対偶) 複葉的に舒ましくない 🔸	育色ノイズではない

【図69】



(47) 12000-59626 (P2000-5964



(48) #2000-59626 (P2000-5964

